This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

(OTASU) NNAJA 30A% SIHT



ATENT COOPERATION TRETY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

To:

United States Patent and Trademark Office (Box PCT)

Crystal Plaza 2 Washington, DC 20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Date of mailing (day/month/year)
15 July 1999 (15.07.99)
in its capacity as elected Office

International application No.

PCT/EP98/06911

International filing date (day/month/year)

21 October 1998 (21.10.98)

Applicant's or agent's file reference P96164WOEK03

Priority date (day/month/year)

01 December 1997 (01.12.97)

Applicant

HILLMER, Hartmut et al

1. Т	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	10 June 1999 (10.06.99)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2. T	he election X was
	was not
m Ri	nade before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under ule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

F. Baechler

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

78

PATENT COOPERATION TRL. TY

·	From the INTERNATIONAL BUREAU	
PCT	То:	
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year)	DEUTSCHE TELEKOM AG Deuschel, W. Technologiezentrum Patentabteilung EK03 D-64307 Darmstadt ALLEMAGNE	
03 August 1999 (03.08.99)		
Applicant's or agent's file reference P96164WOEK03	IMPORTANT NOTIFICATION	
International application No. PCT/EP98/06911	International filing date (day/month/year) 21 October 1998 (21.10.98)	
The following indications appeared on record concerning: X the applicant X the inventor	the agent the common representative	
Name and Address HILLMER, Hartmut Peter-Behrens-Strasse 12	State of Nationality State of Residence DE DE Telephone No.	
D-64287 Darmstadt Germany	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that	t the following change has been recorded concerning:	_
	ddress the nationality the residence	
Name and Address	State of Nationality State of Residence	
HILLMER, Hartmut An den Rehwiesen 16 D-34128 Kasseladt Germany	DE DE Telephone No.	
Comany	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary:		
4. A copy of this notification has been sent to:		
X the receiving Office	the designated Offices concerned	
the International Searching Authority	X the elected Offices concerned	
X the International Preliminary Examining Authority	other:	
	Authorized officer	_
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	G. Bähr	
acsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38	

C py for th Elected Office (EO/US) PATENT COOPERATION TRE...TY

	From t	he INTERNATIONAL E	BUREAU
PCT	To:		-
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year) 03 August 1999 (03.08.99)	Deu Tecl Pate D-64	TTSCHE TELEKOM AG schel, W. nnologiezentrum ntabteilung EK03 l307 Darmstadt EMAGNE	
Applicant's or agent's file reference			
P96164WOEK03		IMPORTANT NOT	TIFICATION
International application No.	Internation	onal filing date (day/month/	year)
PCT/EP98/06911	21 (October 1998 (21.10.98	3)
		-	
1. The following indications appeared on record concerning: X the applicant X the inventor	the age	nt the comm	non representative
Name and Address		State of Nationality	State of Residence
KLEPSER, Bernd Wiesenbacher Strasse 82		DE	DE
D-69151 Neckargemünd Germany		Telephone No.	
		Facsimile No.	
. • .		- · · · · ·	
		Teleprinter No.	
		<u> </u>	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the person the name X the ad	1	the nationality	concerning: the residence
Name and Address		State of Nationality	State of Residence
KLEPSER, Bernd		DE	DE
Schönen Aussicht 14 D-98617 Meiningen Germany		Telephone No.	
Commany		Facsimile No.	
	i İ	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary:			
4. A copy of this notification has been sent to:			<u> </u>
X the receiving Office	ſ	the designated Offices	concerned
the International Searching Authority	וֹ	the elected Offices cor	ncerned
X the International Preliminary Examining Authority	ľ	other:	
t-mad			
The International Bureau of WIPO	Authorized	officer	
34, chemin des Colombettes		G. Bähr	
1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Tolombass	No · /41 22\ 229 92 29	
1 405111110 NO (41-22/ 740.14.33	relephone	No.: (41-22) 338.83.38	



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D 1 3 OCT 1999

WIPO

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

		(Artikel 36 und Rege	91 70 PC	1)
Aktenzeicher	des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN	siehe Mittei vorläufigen	lung über die Übersendung des internationalen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)
		Internationales Anmeldedatum(Ta	n/Monat/.lahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)
PCT/EP98	es Aktenzeichen	21/10/1998	g/wonavoam/	01/12/1997
		nationale Klassifikation und IPK		
H01S3/10		nauonae Nassiinauon unu ii N		
Anmelder				
DEUTSCH	IE TELEKOM AG et al.			
1. Dieser Behörd	internationale vorläufige Pr de erstellt und wird dem Anr	üfungsbericht wurde von der mit nelder gemäß Artikel 36 übermitt	der internati elt.	onale vorläufigen Prüfung beauftragte
2. Dieser	BERICHT umfaßt insgesan	nt 6 Blätter einschließlich dieses	Deckblatts.	
ur Be	d/oder Zeichnungen, die ge	vändert wurden und diesem Beric richtigungen (siehe Regel 70.16	ht zugrunde:	itter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
3. Diese	Bericht enthält Angaben zu Grundlage des Berich Priorität	. •		•
"		s Gutachtens über Neuheit, erfin	derische Tät	igkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
iv	☐ MangeInde Einheitlich			
v	☐ Bearündete Feststellt		n der Neuhei gen zur Stütz	t, der erfinderische Tätigkeit und d r zung dieser Feststellung
VI.	☐ Bestimmte angeführte	e Unterlagen		
VII	Bestimmte Mängel de	er internationalen Anmeldung		
VIII	☐ Bestimmte Bemerkur	ngen zur internationalen Anmeldu	ing	
Datum der 10/06/19	Einreichung des Antrags	Datum		lung dieses Berichts
10,00,19				
	Postanschrift der mit der interna auftragten Behörde: Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 5236	Mosk	mächtigter Bed	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
1	Fax: +49 89 2399 - 4465	I Tel. Ni	r. +49 89 2399	2521

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/06911

I. Grundlage	d s	Berichts
--------------	-----	-----------------

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt weil sie keine Änderungen enthalten.)*:

	nich	t beigefügt, weil sie	e keine Änderu	ıngen e	enthalten.):						
	Bes	chreibung, Seiten) :								
	1-28	1	ursprüngliche	Fassu	ing						
	Pate	entansprüche, Nr.	:								
	1-16	3	ursprüngliche	Fassu	ing						
	Zeio	:hnungen, Blätter	:								
	1/20	0-20/20	ursprüngliche	Fassu	ing .						
2.	Auf	grund der Änderun	gen sind folge	nde Un	terlagen fortg	jefallen:					
		Beschreibung,	Seiten:								
		Ansprüche,	Nr.:								
		Zeichnungen,	Blatt:								
3.		Dieser Bericht ist angegebenen Grü eingereichten Fas	ünden nach Au	ıffassu	ng der Behöre	de über o	nderung den Offe	jen erste nbarung	llt worde sgehalt i	n, da dies n der ursp	e aus den rünglich
4.	Etw	aige zusätzliche B	emerkungen:								
											•
۷.	Be:	gründete Feststel verblichen Anwer	lung nach Art ndbarkeit; Un	ikel 35 terlage	i(2) hinsichtli n und Erklär	ich der N ungen z	Neuheit, zur Stütz	der erfi zung die	nderisch ser Fest	nen Tätigl stellung	keit und der
1.	Fes	ststellung									
	Ne	uheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-16					
	Erf	inderische Tätigkei	it (ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-16					
	Ge	werbliche Anwend	barkeit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-16					

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/06911

Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

- Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 1.
 - D1: US-A-5 536 085 (LI GUO P ET AL) 16. Juli 1996.
 - D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 002 (E-868), 8. Januar 1989 & JP 01 251686 A (CANON INC), 6. Oktober 1989.
 - D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 065 (E-304), 26. März 1985 & JP 59 204292 A (CANON KK), 19. November 1984.
- Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem 2. Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine Anordnung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 9.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem aus D1 bekannten Verfahren zur Wellenlängenabstimmung eines Laserarrays dadurch, daß die zur Einstellung der charakteristischen Wellenlänge des optoelektronischen Bauelements notwendige thermische Änderung der Widerstandsheizung durch gezielte Änderung des Widerstandswertes einer der Widerstandsheizung vorgeschalteten Widerstandsanordnung erfolgt.

Gleicherweise unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 9 von der aus D1 bekannten Laserarray-Anordnung dadurch, daß jeder Widerstandsheizung eine separate, mit der gemeinsamen Spannungs- oder Stromquelle verbundene, in ihrem Gesamtwiderstand veränderbare Widerstandsanordnung vorgeschaltet ist.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 9 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT).



In D1 wird zur genauen Einstellung der Wellenlänge jedes Lasers notwendige thermische Änderung der Widerstandsheizung durch Einstellen der an der Widerstandsheizung anliegenden Spannung (die angebrachte thermische Leistung ist einstellbar von 0-100mW) erreicht, wobei jeder Widerstandsheizung und damit jedem Laser des Arrays jeweils eine Spannungsquelle zugeordnet ist.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe besteht deshalb darin, eine vergleichsweise einfache Anordnung (mit eine einzige gemeinsame Spannungsquelle) zur Abstimmung von optoelektronischen Bauelementen anzugeben, die ebenfalls auf dem Prinzip der thermischen Änderung der Widerstandsheizungen der optoelektronischen Bauelemente beruht. Desweiteren ist das zur Benutzung der Anordnung benötigten Verfahren anzugeben.

Diese Aufgaben werden durch die in den kennzeichnenden Teile der Ansprüche 1 und 9 angegebenen Merkmale gelöst.

Jede Widerstandsheizung ist erfindungsgemäß mit einer separaten Widerstandsanordnung verbunden. Da alle Widerstandsanordnungen über eine einzige Spannungsquelle gespeist werden, entfällt ein beträchtlicher schaltungstechnischer Aufwand.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 9 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT), da dem Dokument D1 kein Hinweis auf die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1 und 9 entnehmen ist.

Den anderen im Recherchenbericht zitierten Dokumenten D2 und D3 ist auch kein Hinweis auf die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 zu entnehmen.

Deshalb wird dem Fachmann die Lösung gemäß der Ansprüche 1 und 9 nicht nahegelegt.



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/06911

Die Ansprüche 2-8 und 10-16 sind vom Anspruch 1 bzw. Anspruch 9 abhängig 3. und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

VII.

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 1. Beschreibung weder der in den Dokumenten D1, D2 oder D3 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

Translation



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P96164WO.1P	FOR FURTHER ACTION	'NNJ	cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/EP98/06911	International filing date (a 21 October 1998		Priority date (day/month/year) 01 December 1997 (01.12.97)
International Patent Classification (IPC) or n H01S 3/103	ational classification and IP	С	
Applicant	DEUTSCHE TELI	EKOM AG	
Authority and is transmitted to the a 2. This REPORT consists of a total of This report is also accompany	pplicant according to Articl 6 sheets, included by ANNEXES, i.e., she asis for this report and/or she 607 of the Administrative learning to Articles.	e 36. uding this cover s ets of the descript eets containing re nstructions under	tion, claims and/or drawings which have ectifications made before this Authority
IV Lack of unity of in V Reasoned stateme citations and expla VI Certain documents VII Certain defects in	t of opinion with regard to new the regard to ne	egard to novelty, tement	step and industrial applicability inventive step or industrial applicability;
Date of submission of the demand 10 June 1999 (10.06)		te of completion of	of this report October 1999 (11.10.1999)
Name and mailing address of the IPEA/EP Facsimile No.		thorized officer	·····

THIS PAGE BLANK (Darie,

rnational application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/EP98/06911

I. Basis of th	e report		
1. This repo	t has been drawn o le 14 are referred to	on the basis of (Replacement in this report as "originally fi	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation led" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
	the international	application as originally fil	led.
\boxtimes	the description,	pages1-28	, as originally filed,
		pages	, filed with the demand,
		pages	, filed with the letter of,
		pages	, filed with the letter of
\boxtimes	the claims,	Nos. 1-16	, as originally filed,
		Nos.	, as amended under Article 19,
		Nos.	, filed with the demand,
		Nos	, filed with the letter of,
		Nos	, filed with the letter of
\bowtie	the drawings,	sheets/fig1/20-20/20	o, as originally filed,
		sheets/fig	, filed with the demand,
		sheets/fig	, filed with the letter of,
		sheets/fig	, filed with the letter of
2. The amen	dments have result	ed in the cancellation of:	
	the description,	pages	
	the claims,	Nos	
	the drawings,	sheets/fig	
	b b	eschliched as if (some af) sh	an amondments had not been made aired they have been considered
			ne amendments had not been made, since they have been considered in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
4. Additiona	l observations, if n	ecessary:	

INTERNATIONAL PRE-MINARY EXAMINATION REPORT

rnational	application No.
PCT/EP	98/06911

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

		<u> </u>			
1.	Statement				
	Novelty (N)	Claims	1-16	YES	
		Claims		NO	
	Inventive step (IS)	Claims	1-16	YES	
		Claims	·	NO NO	
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-16	YES	
		Claims		NO NO	

- 2. Citations and explanations
 - 1. The following documents are referred to:

D1: US-A-5 536 085 (LI GUO P et al.), 16 July 1996

D2: Patent Abstracts of Japan, Vol. 014, No. 002 (E-868), 8 January 1989, & JP-A-01 251 686 (CANON INC), 6 October 1989

D3: Patent Abstracts of Japan, Vol. 009, No. 065 (E-304), 26 March 1985, & JP-A-59 204 292 (CANON KK), 19 November 1984

Document D1, which is considered to be the closest prior art for the subject matter of Claim 1, discloses a method according to the preamble of Claim 1 and an arrangement according to the preamble of Claim 9.

The subject matter of Claim 1 differs from the method known from D1 for tuning wavelengths in a laser array in that the thermal adjustment of the resistance heater which is needed to set the characteristic wavelength of the optoelectronic component is effected by specifically adjusting the resistance of a resistor arrangement upstream of the resistance heater.

In a similar way, the subject matter of Claim 9 differs

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

from the laser array described in D1 in that upstream of each resistance heater there is a separate resistor arrangement, the overall resistance of which is adjustable, said resistor arrangements being connected to a common voltage or current source.

The subject matter of Claims 1 and 9 is therefore novel (PCT Article 33(2)).

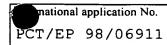
In D1, the thermal adjustment of the resistance heater which is needed for the precise setting of the characteristic wavelength of each laser is effected by adjusting the voltage at the resistance heater (the resulting thermal output is adjustable between 0 and 100 mW). A separate voltage source is assigned to each resistance heater and hence to each laser in the array.

The problem addressed by the present invention is therefore that of providing a comparatively simple arrangement (with a single common voltage source) for tuning optoelectronic components, said arrangement also operating on the principle of thermal adjustment of the resistance heaters associated with the optoelectronic components. The invention also seeks to provide a method for using the claimed arrangement.

These problems are solved by the features defined in the characterising parts of Claims 1 and 9.

According to the invention, each resistance heater is connected to a separate resistor arrangement. Because all the resistor arrangements receive power from a single voltage source, the circuit complexity is significantly reduced.

INTERNATIONAL PRECIMINARY EXAMINATION REPORT



The subject matter of Claims 1 and 9 involves an inventive step (PCT Article 33(3)) because there is nothing in document D1 to suggest the characterising features of Claims 1 and 9.

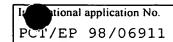
The other documents cited in the search report (D2 and D3) likewise contain nothing to suggest the characterising features of Claim 1.

The solutions proposed in Claims 1 and 9 are therefore not obvious to a person skilled in the art.

3. Claims 2-8 and 10-16 are dependent on Claims 1 and 9 respectively and therefore also meet the PCT requirements of novelty and inventive step.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:



VII. Certain defects in the international application

Contrary to the requirements of PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not indicate the relevant prior art

disclosed in documents D1, D2 and D3, nor does it cite the

said documents.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORTS ACCOMPANYING SHEET

International file number: PCT/EP98/06911

400 Rec'd PCT/PTO 0 1 JUN 2000

1. Reference is made to the following documents:

D1: US-A-5 536 085 (LI GUO P ET AL) 16 July 1996.

D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 002 (E-868), 8 January 1989 & JP 01 251686 A (CANON INC), 6 October 1989.

D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 065 (E-304), 26 March 1985 & JP 59 204292 A (CANON KK), 19 November 1984.

Document D1 is regarded as the nearest prior art to the subject matter of claim
 It discloses a process according to the preamble of claim 1 as well as an arrangement according to the preamble of claim 9.

The subject matter of claim 1 differs from the process known from D1 for the wavelength tuning of a laser array in that the thermal change of the resistance heater, required for adjusting the characteristic wavelength of the optoelectronic component, is accomplished through selective changing of the resistance value of a resistor arrangement connected upstream of the resistance heater.

Likewise, the subject matter of claim 9 differs from the laser-array arrangement known from D1 in that connected upstream of each resistance heater is a separate resistor arrangement connected to the common voltage or current source and variable in its total resistance.

The subject matters of claims 1 and 9 are therefore new (Article 33 (2) PCT).

In D1, the thermal change of the resistance heater required for accurately adjusting the wavelength of each laser is accomplished by adjusting the voltage applied to the resistance heater (the appropriate thermal power is adjustable



EM360466583US

SARRICATION OF THE 2003 AND STORE THE STORE TH

1.00

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT - ACCOMPANYING SHEET

International file number: PCT/EP98/06911

from 1-100mW), each resistance heater and therefore each laser of the array being associated with a voltage source.

The problem to be solved by the present invention consists, therefore, in indicating a comparatively simple arrangement (including one single common voltage source) for tuning optoelectronic components, said arrangement likewise being based on the principle of the thermal changing of the resistance heaters of the optoelectronic components. It is a further problem of the present invention to indicate the process required for the use of the arrangement.

These problems are solved by the features indicated in the characterizing parts of claims 1 and 9.

According to the invention, each resistance heater is connected to a separate resistor arrangement. Since all the resistor arrangements are supplied via a single voltage source, this renders the circuitry considerably less complex.

The subject matter of claims 1 and 9 is based on an inventive step (Article 33(3) PCT), since document D1 contains no reference to the characterizing features of claims 1 and 9.

In addition, the other documents D2 and D3 cited in the search report contain no reference to the characterizing features of claim 1.

Therefore, the solution according to claims 1 and 9 is not obvious to the person skilled in the art.

3. Claims 2-8 and 10-16 are dependent on claim 1 and claim 9, respectively, and therefore likewise satisfy the requirements laid down in the PCT with regard to novelty and inventive step.



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT -ACCOMPANYING SHEET

International file number: PCT/EP98/06911

VII.

In contradiction to the requirements laid down in Rule 5.1 a) ii) PCT, neither the 1. pertinent prior art as disclosed in documents D1, D2 or D3 nor said documents are indicated in the description.

I, the below named translator, hereby declare that:
I am knowledgeable in the English language
and that I believe the above English translation
Is a true and complete translation of the original German text
as presented to me as original / certified copy / photocopy.

Full name and seal of the translator:

Manfred Brandl Nibalungenstr. 84 80639 MUNCHEN Tei. 178,637

THIS PAGE BLANK (USPTO)

VERTRÜBER DIE INTERNATIONALE ZUMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

CALL COLOR DE LA C	<u>-</u>	-1-6 - 8 414 -11 81			
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit				
P96164W0EK03 Internationales Aktenzeichen	VORGEHEN zutreffend, nachsteher Internationales Anmeldedatum		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)		
PCT/EP 98/06911	(Tag/Monat/Jahr) 21/10/1998		01/12/1997		
Anmelder	·		<u></u>		
DEUTSONE TELEVON AS A 3					
DEUTSCHE TELEKOM AG et al.					
Dieser internationale Recherchenbericht wurdertikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In			erstellt und wird dem Anmelder gemäß		
Dieser internationale Recherchenbericht umf. X Darüber hinaus liegt ihm jed		Blätter. diesem Bericht genannte	n Unterlagen zum Stand der Technik bei:		
Grundlage des Berichts					
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eine 			ernationalen Anmeldung in der Sprache s anderes angegeben ist.		
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel-23.1 b))		einer bei der Behörde e	ingereichten Übersetzung der internationalen		
Recherche auf der Grundlage des	Sequenzprotokolis durc	ngeführt worden, das	Aminosäuresequenz ist die internationale		
in der internationalen Anme			ngaraicht worden ist		
zusammen mit der internati bei der Behörde nachträglic		•	ngereicht worden ist.		
bei der Behörde nachträglic		-	ist		
	hträglich eingereichte s	chriftliche Sequenzproto	koll nicht über den Offenbarungsgehalt der		
			em schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,		
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht rec	herchlerbar erwiesen (s	siehe Feld I).		
3. Mangelnde Einheitlichkei	t der Erfindung (siehe	Feld II).			
Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	ndung				
X wird der vom Anmelder ein	gereichte Wortlaut gene	hmigt.			
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festç	esetzt:			
Hinsichtlich der Zusammenfassung					
wird der vom Anmelder ein	gereichte Wortlaut gene	hmigt.			
wurde der Wortlaut nach R	egel 38.2b) in der in Fel e innerhalb eines Mona	d III angegebenen Fassi ts nach dem Datum der	ung von der Behörde festgesetzt. Der Absendung dieses internationalen		
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	-		n: Abb. Nr. <u>12b</u>		
X wie vom Anmelder vorgesc	hlagen		keine der Abb.		
weil der Anmelder selbst ke	eine Abbildung vorgesch	nlagen hat.			
weil diese Abbildung die Er	findung besser kennzei	chnet.			

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Internationales Aktenzeichen

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 98/06911

Feld III

WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zur Wellenlängenabstimmung einer optoelektronischen Bauelemente-Anordnung, die zumindest
aus zwei optoelektronischen Bauelementen besteht, mit dem Ziel der Kostenminimirung. Erfindungsgemäß wird die charakteristische Wellenlänge für jedes
optoelektronische Bauelement über eine zwischen gemeinsamer Spannungsquelle/
Stromquelle (Uo/I) und Heizung (H) des jeweiligen optoelektronischen Bauelements geschaltete Widerstandsanordnung (RM) eingestellt, wobei die Wellenlängenabstimmung durch Veränderung der Heizleistung mittels Änderung des
Gesamtwiderstandes der Widerstandsanordnung (RM) erfolgt. Die erfindungsgemäße Lösung ist auf die Wellenlängenabstimmung von Halbleiterlasern,
optischen Verstärkern, Filtern, Wellenängenmultiplexern und Wellenleitern
ausgerichtet.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 H01S3/103 H01S3/25 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 H01S Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. US 5 536 085 A (LI GUO P ET AL) Α 1,9,16 16. Juli 1996 siehe Spalte 3, Zeile 63 - Spalte 4, Zeile see Cap. 3, Dio 12- Cal. 4, Dio 3 Α PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1,9,16 vol. 014, no. 002 (E-868), 8. Januar 1989 & JP 01 251686 A (CANON INC), 6. Oktober 1989 Aboston X siehe Zusammenfassung Α PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1,9,16 vol. 009, no. 065 (E-304), 26. März 1985 & JP 59 204292 A (CANON KK), 19. November 1984 siehe Zusammenfassung Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu lχ Siehe Anhang Patentfamilie "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theories assenden ist. ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden _{"Y} Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung en die verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 13. April 1999 20/04/1999 Bevoilmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Claessen, L

Fax: (+31-70) 340-3016

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

nternational Application No
PCT/EP 98/06911

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5536085 A	16-07-1996	NONE	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01S 3/103, 3/25

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/28998

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

10. Juni 1999 (10.06.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/06911

(22) Internationales Anmeldedatum: 21. Oktober 1998 (21.10.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 55 457.1

1. Dezember 1997 (01.12.97) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): DEUTSCHE TELEKOM AG [DE/DE]: Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HILLMER, Hartmut [DE/DE]; Peter-Behrens-Strasse 12, D-64287 Darmstadt (DE). KLEPSER, Bernd [DE/DE]; Wiesenbacher Strasse 82, D-69151 Neckargemund (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR TUNING THE WAVELENGTH OF AN OPTOELECTRONIC COMPONENT ARRANGE-**MENT**

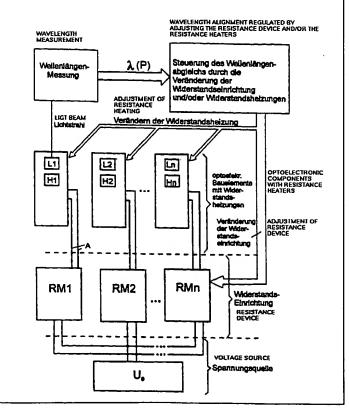
(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR WELLENLÄNGENABSTIMMUNG EINER OPTOELEKTRONISCHEN **BAUELEMENTE-ANORDNUNG**

(57) Abstract

The invention relates to a cost-reductive method and device for tuning the wavelength of an optoelectronic component arrangement comprising at least two optoelectronic components. According to the invention, the characteristic wavelength for each optoelectronic component is adjusted by means of a resistance device (RM) which is connected between a common voltage/power source (U_0/I) and a heating device (H) pertaining to said components. Heating capacity is modified by changing the overall resistance of the resistance device (RM) in order to adjust wavelength. The invention can be used to tune the wavelength of semiconductor lasers, filters, wavelength multiplexers and waveguides.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung Wellenlängenabstimmung einer optoelektronischen Bauelemente-Anordnung, die zumindest aus zwei optoelektronischen Bauelementen besteht, mit dem Ziel der Kostenminimierung. die Erfindungsgemäß wird charakteristische Wellenlänge für jedes optoelektronische Bauelement über eine zwisgemeinsamer Spannungsquelle/Stromquelle (U_0/I) Heizung (H) des jeweiligen optoelektronischen Bauelements geschaltete Widerstandsanordnung (RM) eingestellt, wobei die Wellenlängenabstimmung durch Veränderung der Heizleistung mittels Änderung des Gesamtwiderstandes der Widerstandsanordnung Die erfindungsgemäße Lösung ist auf die (RM) erfolgt. Wellenlängenabstimmung von Halbleiterlasern, optischen Verstärkern, Filtem, Wellenlängenmultiplexern und Wellenleitern ausgerichtet.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AΤ	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	ТJ	Tadschikistaл
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
ВЈ	Benin	ΙE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	OB	Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen	_,,	Zimbaowe
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	ΚZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Verfahren und Anordnung zur Wellenlängenabstimmung einer optoelektronischen Bauelemente-Anordnung

Beschreibung:

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Wellenlängenabstimmung von optoelektronischen Bauelementen einer optoelektronischen Bauelemente-Anordnung.

Die Erfindung betrifft eine optoelektronische Bauelemente-Anordnung mit zumindest zwei optoelektronischen Bauelementen. Jedem einzelnen optoelektronischen Bauelement der Bauelemente-Anordnung ist jeweils eine Widerstandsheizung zur Einstellung der charakterischen Wellenlänge des optoelektronischen Bauelements zugeordnet.

In zunehmendem Maße werden zur Datenübertragung beziehungsweise zur Übertragung von Fernseh- und Rundfunkkanälen optische Übertragungssysteme eingesetzt. Im allgemeinen besteht ein solches optisches Übertragungssystem aus einem lichtführenden Wellenleiter, einem Halbleiterlaser als Lichterzeuger und einem Lichtdetektor. Der Halbleiterlaser strahlt dabei Licht mit einer bestimmten, charakteristischen Wellenlänge aus. Diese charakteristische Wellenlänge ist im wesentlichen abhängig vom eingesetzten Material, läßt sich aber beispielsweise durch thermische Einwirkung innerhalb eines bestimmten Wellenlängenbereichs einstellen. Zur Erhöhung der über einen Wellenleiter übertragbaren Datenmenge lassen sich mehrere einem Wellenleiter zu-

geordnete Halbleiterlaser verwenden, die mit unterschiedlichen Wellenlängen arbeiten. Hierbei ist es jedoch notwendig, daß die Wellenlängen sehr genau eingehalten werden, so daß am Ende der Übertragung eine eindeutige Differenzierung der Daten möglich ist.

Da die charakteristische Wellenlänge von Halbleiterlasern herstellungsbedingt innerhalb eines Toleranzbereiches differiert, müssen die Halbleiterlaser vor dem Einsatz zur Datenübertragung abgestimmt werden. Hierzu bedient man sich beispielsweise sogenannter Widerstandsheizungen, die durch thermische Einwirkung die charakteristische Wellenlänge eines Halbleiterlasers verändert. Die Abstimmung erfolgt im allgemeinen durch Einstellen der an der Widerstandsheizung anliegenden Spannung, wobei hier jeder Widerstandsheizung und damit jedem optoelektronischen Bauelement der Bauelemnte-Anordnung jeweils eine Spannungsquelle zugeordnet ist.

Dies hat jedoch den Nachteil, daß ein sehr aufwendiger Aufbau notwendig wird. Desweiteren ist eine spätere Abstimmung der Anordnung in einfacher Weise nicht mehr möglich.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht deshalb darin, ein Verfahren zur Abstimmung von optoelektronischen Bauelementen anzugeben, das einfach ist und sich mit minimalem Kostenaufwand realisieren läßt. Desweiteren ist die zur Realisierung des Verfahrens benötigte Anordnung anzugeben. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren gelöst, welches ebenfalls auf dem Prinzip der thermischen Änderung der Widerstandsheizungen der optoelektronischen Bauelemente der betreffenden optoelektronischen Bauelemente-Anordnung beruht.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Verfahren gelöst, das die Merkmale des Anspruchs 1 umfaßt. Die Bauelemente-Anordnung wird durch eine Lösung realisiert, die die Merkmale des Anspruchs 9 aufweist. Das Verfahren beruht darauf, daß im ersten Verfahrensschritt für jedes optoelektronische Bauelement der optoelektronischen Bauelemente-Anordnung die Wellenlänge erfaßt wird. Anhand des Vergleichs der erfaßten Wellenlänge mit der gewünschten charakteristischen Wellenlänge wird für jedes optoelektronische Bauelement der optoelektronischen Bauelemente-Anordnung die Abweichung von der gewünschten charakteristischen Wellenlänge ermittelt. Anschließend wird erfindungsgemäß eine dem jeweiligen optoelektronischen Bauelement zugeordnete Widerstandsanordnung, abhängig von der ermittelten Wellenlängenabweichung, verändert. Die Widerstandsanordnung, welche der Heizung des optoelektronischen Bauelements vorgeschaltet ist, beeinflußt über ihren Gesamtwiderstand die Heizleistung der Heizung des optoelektronischen Bauelements. Der Gesamtwiderstand der Widerstandsanordnung wird so eingestellt, daß über die Heizleistung die gewünschte charakteristischen Wellenlänge des betreffenden optoelektronischen Bauelements erzielt wird. Diese Prozedur wird für jedes optoelektronische

Bauelement der optoelektronischen Bauelemente-Anordnung einzeln durchgeführt.

Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt eine sehr einfache Einstellung der optoelektronischen Bauelemente einer Bauelemente-Anordnung, beispielsweise einer Halbleiterlaserzeile. Insbesondere läßt sich das Verfahren vollautomatisch durchführen, was große Vorteile bei der Verwendung von optoelektronischen Bauelementen in größerem Umfang hat.

Die erfindungsgemäße Bauelemente-Anordnung umfaßt erfindungsgemäß neben einer gemeinsamen Spannungsquelle Uo Widerstandsanordnungen RM. Dabei ist jedem optoelektronischen Bauelement der Bauelemente-Anordnung eine separate Widerstandsanordnung RM zugeordnet. Die Widerstandsanordnung RM ist jeweils zwischen gemeinsamer Spannungsquelle U_0 und Widerstandsheizung H angeordnet, das heißt, jeder Widerstandsheizung H ist eine separate Widerstandsanordnung RM vorgeschaltet. Jede Widerstandsanordnung RM besteht aus einem Netzwerk von Widerständen R. Damit läßt sich die Heizleistung für jedes optoelektronische Bauelement der optoelektronischem Bauelemente-Anordnung sehr einfach durch entsprechende Veränderungen im Widerstandsnetzwerk einstellen. Da alle Widerstandsanordnungen RM über eine einzige Spannungsquelle Uo gespeist werden, entfällt ein beträchtlicher schaltungstechnischer Aufwand und es werden damit Kosten eingespart. Ein weiterer Vorliegt darin begründet, daß in sehr einfacher Weise auch nachträglich eine Abstimmung der charakteristischen Wellenlänge der optoelektronischen

Bauelemente durch Verändern des Gesamtwiderstandes und damit der Heizleistung durchführbar ist.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht darin, die Widerstandsanordnung RM als Widerstandsarray auszubilden, welches mehrere systematisch nach Widerstandswerten geordnete Widerstandselemente umfaßt. Vorzugsweise weist die Widerstandsanordnung RM eine oder mehrere Reihen von Kontaktfelder K auf, wobei die Widerstände der Widerstandsanordnung RM zwischen einzelnen Kontaktfeldern K angeordnet sind. Durch schalten bzw. überbrücken von Kontaktfeldern K läßt sich der Gesamtwiderstand der Widerstandsanordnung RM und damit die Heizleistung der Heizung des optoelektronischen Bauelements verändern. Da die Kontaktfelder K und die Widerstände nach logischen Gesichtspunkten angeordnet sind, kann die Heizleistung in einfacher Art und Weise durch beschalten von Kontaktfeldern K eingestellt werden, wobei sich die konkret zu schaltenden Verbindungen aus der Systematik der Matrix festlegen lassen. Gleichzeitig beinhaltet das erfindungsgemäße Verfahren die Möglichkeit, bei Bedarf jederzeit eine notwendige Anpassung der Heizleistung vornehmen zu können.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Anordnung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:

- Figur 1 ein Blockdiagramm einer optoelektronischen Bauelemente-Anordnung,
- Figur 2a eine schematische Darstellung einer Widerstandseinrichtung,
- Figur 2b ein Schaltbild der Widerstandseinrichtung,
- Figur 2c Darstellung, wie sich die Heizleistungen verschiedener Kanäle gegenseitig beeinflussen,
- Figur 3 ein erstes Ausführungsbeispiel einer Bauelemente-Anordnung,
- Figur 4a ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Bauelemente-Anordnung,
- Figur 4b bis 4d

 drei Diagramme zur Bestimmung der Heizleistung,
- Figur 5a ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Bauelemente-Anordnung,
- Figur 5b ein Diagramm zur Berechnung der Heizleistung,

Figur 6	ein weiteres Ausführungsbeispiel einer
	Bauelemente-Anordnung,
Figur 7	ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Bauelemente-Anordnung,
Figur 8	ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Bauelemente-Anordnung,
Figur 9	ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Bauelemente-Anordnung,
Figur 10	ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Bauelemente-Anordnung,
Figur 11	ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Bauelemente-Anordnung, und
Figur 12a	Ausführungsbeispiel mit Widerstandsan- ordnung auf der Bauelementezeile
Figur 12b	ein Diagramm zur Veranschaulichung des Verfahrens.
Figur 13	ein Ausführungsbeispiel mit Stromquelle

In Figur 1 ist eine Bauelemente-Anordnung 1 dargestellt, die eine Anzahl von Halbleiterlasern L1 bis Ln umfaßt. Der grundsätzliche Aufbau einer solchen Halbleiterlaserzeile ist bekannt, weshalb an dieser Stelle auf deren genaue Beschreibung verzichtet wird. Zur gleichzeitigen Übertragung von Daten in

einem optischen Datenübertragungssystem arbeiten die Halbleiterlaser L1-Ln mit unterschiedlichen Wellenlängen beziehungsweise Frequenzen. Herstellungsbedingt strahlen die Halbleiterlaser L1-Ln nicht immer mit der gewünschten Wellenlänge aus. Vor und/oder während der Inbetriebnahme erfolgt deshalb eine Abstimmung auf die gewünschte Wellenlänge durch Verändern der charakteristischen Wellenlänge, wobei im vorliegenden Fall der thermische Effekt ausgenutzt wird. Durch entsprechende individuelle Beaufschlagung der Halbleiterlaser L1-Ln mit einer bestimmten Temperatur, läßt sich die jeweilige Wellenlänge innerhalb eines bestimmten Bereichs variieren.

Hierzu ist jedem Halbleiterlaser L1 bis Ln zumindest eine Widerstandsheizung H1 bis Hn zugeordnet. Jede der Widerstandsheizungen H1 bis Hn besteht aus einem Stromleiter, der einen entsprechend hohen Widerstand aufweist und bei Anlegen einer Spannung Wärme entwickelt und im jeweiligen Halbleiterlaser L1-Ln ein Temperaturfeld erzeugt. Zur Erzeugung des gewünschten Temperaturfeldes muß in vielen Fällen die Heizleistung erst eingestellt werden. Dazu ist jede Widerstandsheizung H1-Hn erfindungsgemäß mit einer separaten Widerstandsanordnung RM1-RMn verbunden. Alle Widerstandsanordnungen RM1-RMn mit einer gemeinsamen Spannungsquelle U_0 verbunden und werden von ihr gespeist. Die Widerstandsanordnungen RM1-RMn sind vorzugsweise als Widerstandsarrays ausgebildet, welche sich aus einzelnen Widerständen zusammensetzen. Eine gezielte Manipulation

der einzelnen Widerstände führt zu einer gezielten Veränderung des Gesamtwiderstandes der als Widerstandsarray ausgebildeten Widerstandsanordnung. Durch die Veränderung des Gesamtwiderstandes der einzelnen Widerstandsanordnungen RM1-RMn wird eine Veränderung des durch die Widerstandsheizungen H1-Hn fließenden Stroms und damit eine Änderung der Heizleistung der einzelnen Widerstandsheizungen H1-Hn bewirkt. Über die Änderung der Heizleistung der einzelnen Widerstandsheizungen H1-Hn erfolgt die individuelle Änderung der Wellenlänge bis die gewünschte charakteristische Wellenlänge für jeden einzelnen Halbleiterlaser L1-Ln eingestellt ist.

Die Einstellung der Widerststände der Widerstandsanordnungen RM1-RMn auf bestimmte Widerstandswerte erfolgt elektrisch, optisch und/oder durch elektromagnetische Wellen.

Die Widerstandsanordnungen RM1-RMn lassen sich einerseits auf einem die Halbleiterlaser L1-Ln tragenden Träger/Isolator anordnen. Desweiteren ist es möglich, die Widerstandsanordnungen RM1-RMn getrennt von den Halbleiterlasern L1-Ln anzuordnen, beispielsweise an einer später sehr leicht zugänglichen Stelle der gesamten Einheit zur Datenübertragung.

Wie bereits erwähnt, läßt sich die charakteristische Wellenlänge λ_q jedes einzelnen optoelektronischen Bauelements, wie beispielsweise bei den Halbleiterlasern L1-Ln, über die Temperatur jedes einzelnen Halbleiterlasers L1-Ln und somit über die Heizleistung P_q beziehungsweise den Heizstrom I_q

durch die Widerstandsheizungen H1-Hn individuell einstellen. Die Grundlage für jeden Kanal q, mit $q \in [1-n]$, den Heizstrom individuell einzustellen, bildet eine matrixartige Anordnung der Widerstandsanordnungen RM1-RMn.

In Figur 2a ist eine derartige Widerstandsanordnung für den Kanal q dargestellt. Die Widerstandsanordnung besteht aus Kontaktfeldern $K_{q,i,j}$ mit den Koordinaten (i,j), wobei $i \in [1, r]$ und $j \in [1, s]$ ist, q die Bauelemente-Nummer (Kanal) angibt und r bzw. s die Größe der matrixartigen Widerstandsanordnung in y- bzw. x-Richtung ist. Die eingezeichneten Indizes j und i bezeichnen die Spalten- und Zeilennummern. Diese matrixartige Anordnung von Kontaktfeldern wird im folgenden auch als Kontaktmatrix bezeichnet. Die Kontaktfelder sind über ohmsche Widerstände $R_{q,i,j\rightarrow q,k,l}$ gekoppelt, wobei $R_{q,i,j\rightarrow q,k,l}$ einen Widerstand zwischen den Kontaktfeldern $K_{q,i,j}$ und $K_{q,k,1}$ bezeichnet. Die Widerstandswerte der ohmschen Widerstände umfassen Werte $R_{q,i,j\rightarrow q,k,l} = 0$ (Kurzschluß) bis $R_{q,i,j\rightarrow q,k,l\rightarrow\infty}$ (keine elektrisch leitende Verbindung oder Isolator). Die Kontaktfelder $K_{q,t,u}$ und $K_{q,v,w}$ mit $(t,u) \neq (v,w)$ sind mit einer elektrischen Spannungsquelle Uo verbunden, die zwischen den Kontaktfeldern eine Potentialdifferenz U(t) beliebigen zeitlichen Verlaufs erzeugt. Die elektrischen Verbindungen der Spannungsquelle ${\tt U}_{\tt 0}$ mit den Kontaktfeldern $K_{q,t,u}$ und $K_{q,v,w}$ werden im folgenden mit LQ bezeichnet. Eine elektrische Verbindung LQ besteht aus einer Zahl $f \ge 1$ im mathematischen Sinne mehrfach zusammenhängender elektrisch leitfähiger Gebiete, die elektrisch miteinander

verbunden sind. Diese Gebiete enthalten eine Anzahl $g \ge 0$ elektrisch leitender Gebiete der Widerstandheizung Hq eines Kanals q und eine Anzahl $h \ge 0$ elektrisch leitender Gebiete der matrixartigen Anordnung aus Kontaktfeldern.

Die Kontaktfelder $K_{q,a,b}$ und $K_{q,c,d}$ mit $(a,b) \neq (c,d)$ sind über eine elektrisch leitende Verbindung mit der Widerstandsheizung Hq derart verbunden, daß eine Potentialdifferenz zwischen den Punkten $K_{q,a,b}$ und $K_{q,c,d}$ einen elektrischen Stromfluß durch die Widerstandsheizung Hq hervorruft, falls der Widerstandswert R_q der Widerstandsheizung Hq endlich groß ist.

Die Anordnung aus Spannungsquelle U_0 , elektrischen Verbindungen LQ, matrixförmiger Anordnung aus Kontaktfeldern, den ohmschen Widerständen $R_{q,i,j\to q,k,1}$ zwischen den Kontaktfeldern $K_{q,i,j}$ und $K_{q,k,1}$ wird erfindungsgemäß derart manipuliert beziehungsweise abgestimmt, daß sich an der elektrischen Widerstandsheizung Hq eine Heizleistung P_q einstellt, die durch die thermische Ankopplung der Widerstandsheizung Hq am Halbleiterlaser Lq eine Temperaturänderung ΔT_q am Halbleiterlaser Lq hervorruft. Diese Temperaturänderung bewirkt eine Wellenlängenverschiebung $\Delta \lambda_q$ der charakteristischen Wellenlänge des Kanals q.

Die individuelle Einstellung der Wellenlänge λ_q des Kanals q läuft nach folgendem Verfahren ab: Zu Beginn des Verfahrens wird eine Heizleistung

 $P_q \ge 0$ eingestellt, aus der sich eine Wellenlänge λ_q ergibt. Das Ziel ist, die Heizleistung derart einzustellen, daß die Wellenlänge $\lambda_{q,s}$ beträgt.

Die Heizleistung der Widerstandsheizung wird in einem Bereich variiert, in dem die damit verbundene Wellenlängenänderung den Bereich der gewünschten Wellenlänge $\lambda_{q,s}$ abdeckt. Aus dieser Messung ergibt sich ein funktioneller Zusammenhang $\lambda_q(P_q)$. Entsprechend läßt sich aus diesem Zusammenhang für eine Wellenlänge $\lambda_{q,s}$ die Heizleistung P_q bestimmen. Die gewünschte Heizleistung P_q läßt sich durch verändern der Widerstandsanordnung RMq einstellen. Auch durch Einstellen der Spannung an der Spannungsquelle U_0 läßt sich die Heizleistung $P_{\rm q}$ variieren, wobei jedoch entsprechend auch die Heizleistung der anderen optoelektronischen Bauelemente verändert wird. Durch die Größe der angelegten Spannung an den Kontaktfeldern $K_{q,t,u}$ und $K_{q,v,w}$, die Dimensionierung und Anordnung der Widerstände $R_{q,i,j\rightarrow q,k,l}$ und Überbrückungen (Kurzschlüsse) zwischen den Kontaktfeldern sowie Bemessung der Größe Heizwiderstandes Pq der Widerstandsheizung Hq wird der maximale Betrag der Leistungsvariation ΔP_q = $P_{q,max}-P_{q,min}$ eines Kanals q festgelegt. Aus dieser Leistungsvariation ΔP_q ergibt sich eine maximale Wellenlängenvariation $\Delta \lambda_{g,max}$.

Eine weitere Möglichkeit, die charakteristische Wellenlänge einzustellen, besteht darin, die Heizleistung P_q auf einen bestimmten Wert $P\geq 0$ einzustellen und die dazugehörige Wellenlänge zu messen. Dann wird auf der Grundlage von abgespeicherten Erfahrungswerten zu dem funktionellen Zusammenhang $\lambda_q\left(P_q\right)$ die Heizleistung P_q verändert.

Es ist auch denkbar, die Heizleistung P_q nacheinander auf zwei Werte einzustellen und jeweils die zugehörige Wellenlänge zu messen. Anschließend wird der Verlauf des funktionellen Zusammenhangs $\lambda_q(P_q)$ durch Interpolation und/oder Extrapolation der zuvor ermittelten Wellenlängen berechnet und entsprechend die Heizleistung P_q verändert.

Ebenfalls ist es denkbar, die Heizleistung P_q in einem Intervall in bestimmten Schritten ΔP zu variieren und die entsprechende Wellenlänge zur Erstellung des funktionellen Zusammenhangs λ_q (P_q) zu messen und anhand des ermittelten Zusammenhangs die Heizleistung P_q zu verändern.

Selbstverständlich ist es auch möglich, die Heizleistung $P_{\rm q}$ kontinuierlich zu variieren, bis die gewünschte charakteristische Wellenlänge erreicht ist.

Bei der Einstellung der Heizleistung P_q muß für die Widerstandswerte der Verbindungen LQ zwischen der Spannungsquelle U_0 und der matrixartigen Anordnung von Kontaktfeldern $K_{q,1,1}$ $-K_{q,k,1}$ sowie dem Innenwiderstand der Spannungsquelle U_0 folgende Forderung erfüllt sein: Haben bei einer Bauelemente-Anordnung von n Kanälen mit n Widerstandsheizungen und n Anordnungen von Kontaktfeldern eine Anzahl von n-1 Widerstandsheizungen H eine Heizleistung $P_{q,min}$ und eine beliebige Widerstandsheizung H_s die Heizleistung P_s mit $P_{s,min} < P_s < P_{s,max}$ und $s \neq e$, dann müssen die elektrischen Verbindungen LQ der Spannungsquel-

le U_0 mit den Kontaktfeldern der einzelnen Kanäle q sowie der Innenwiderstand der Spannungsquelle U_0 derart dimensioniert sein, daß bei einer Variation der Heizleistungen der n-1 Kanäle um ΔP_0 , also von P_0 , min nach P_0 , max, die Heizleistung der Widerstandsheizung H_0 um einen Wert ΔP_0 , F_0 variert, mit einem Wert $0 < E_0 < 1$, der frei wählbar ist, jedoch möglichst klein sein sollte, um eine gegenseitige Beeinflussung der Kanäle zu minimieren.

In Figur 2b ist das Schaltbild eines Ausführungsbeispiels mit drei Widerstandsheizungen dargestellt. Die matrixartigen Anordnungen von Kontaktfeldern ist in diesem einfachen Fall derart gestaltet, daß sie zu Gesamtwiderständen (im folgenden mit Vorwiderständen R_{V1} - R_{V3} bezeichnet), die zum Heizwiderstand R_{H1} - R_{H3} in Serie geschaltet sind, zusammengefaßt werden können. Die elektrischen Verbindungen LQ der Spannungsquelle U_0 mit den Kontaktfeldern zu den Gesamtwiderständen R_{V1} - R_{V3} und Heizwiderständen R_{H1} - R_{H3} haben einen Leitungswiderstand R_{L1} - R_{L3} . Der Innenwiderstand der Spannungsquelle U_0 ist im Widerstand R_{L1} enthalten.

Die Widerstandswerte der Vorwiderstände $R_{V1}-R_{V3}$ und Heizwiderstände $R_{H1}-R_{H3}$ werden entsprechend der nötigen Heizleistungen P_1 – P_3 beziehungsweise Wellenlängenverschiebung und der Größe der zur Verfügung stehenden Spannung Uo dimensioniert. Die Leitungwiderstände $R_{L1}-R_{L3}$ müssen obige Forderung erfüllen. Die Leistungen der Heizwiderstände $R_{H1}-R_{H3}$ ergeben sich aus:

 $P_q = I_q^2 R_{Hq}$ mit q = 1,2,3 und R_{Hq} = Widerstand der q-ten Heizung H_q

und den Strömen

$$\begin{split} I_{1} &= \frac{U_{o}}{R_{ges}} \left(1 - \frac{R_{L1}}{R_{ges}} \right) \\ I_{2} &= \frac{U_{O}}{R_{\beta}} \left[1 - \frac{R_{L1}}{R_{ges}} - \frac{R_{L2}}{R_{ges}} + \frac{R_{L2}}{R_{\gamma}} \left(1 - \frac{R_{L1}}{R_{ges}} \right) \right] \\ I_{3} &= \frac{U_{O}}{R_{\alpha} + R_{L3}} \left[1 - \frac{R_{L1}}{R_{ges}} - \frac{R_{L2}}{R_{ges}} + \frac{R_{L2}}{R_{\gamma}} \left(1 - \frac{R_{L1}}{R_{ges}} \right) \right] \end{split}$$

und

$$\begin{split} R_{\alpha} &= R_{L3} + R_{\nu 3} + R_{H3} \\ R_{\beta} &= R_{\nu 2} + R_{H2} \\ R_{\gamma} &= R_{\nu 1} + R_{H1} \\ R_{get} &= \text{Gesamtwiderstand} \end{split}$$

In Figur 2 c ist die oben genannte Forderung für Kanal 1 dargestellt. Die Heizleistung P_1 von Kanal 1 hat einen beliebigen Wert innerhalb von ΔP_1 . Die restlichen Kanäle 2 und 3 haben eine Heizleistung von $P_{2,min}$ beziehungsweise $P_{3,min}$. Wird die Heizleistung der Kanäle 2 und 3 auf $P_{2,max}$ beziehungsweise $P_{3,max}$ erhöht, so muß die Abweichung von P_1 kleiner sein als $\epsilon_1 \bullet \Delta P_1$.

Im folgenden wird die Berechnung der Widerstände R_{L1} bis R_{L3} kurz dargestellt:

$$\frac{\Delta P_{1,Fehler}}{\Delta P_{1}} = \frac{P_{.1}^{(min)}(R_{\nu_{1}},R_{L1},R_{L2},R_{L3}) - P_{1}^{(max)}(R_{\nu_{1}},R_{L1},R_{L2},R_{L3})}{\Delta P_{1}} < \varepsilon_{1}$$

für beliebiges R_{ν_1}

$$\frac{\Delta P_{2,Fehler}}{\Delta P_{2}} = \frac{P_{2}^{(\min)} \left(R_{\nu_{2}}, R_{L1}, R_{L2}, R_{L3} \right) - P_{2}^{(\max)} \left(R_{\nu_{2}}, R_{L1}, R_{L2}, R_{L3} \right)}{\Delta P_{2}} < \varepsilon_{2}$$
 für beliebiges $R_{\nu_{2}}$

$$\frac{\Delta P_{3,Fehler}}{\Delta P_{3}} = \frac{P_{2}^{(\min)} \left(R_{V3}, R_{L1}, R_{L2}, R_{L3}\right) - P_{3}^{(\max)} \left(R_{V3}, R_{L1}, R_{L2}, R_{L3}\right)}{\Delta P_{3}} < \varepsilon_{2}$$
 für beliebiges R_{V3}

mit

 $P_q^{(min)}$: Heizleistung des Kanals q, wobei die restlichen Kanäle eine Heizleistung $P = P_{s,min}$ haben.

 $P_q^{(\max)}$: Heizleistung des Kanals q, wobei die restlichen Kanäle eine Heizleistung $P = P_{s,\max}$ heben.

Aus obigen drei Gleichungen können die Maximalwerte der Leitungswiderstände $R_{L1},\ R_{L2},\ R_{L3}$ berechnet werden.

Eine entsprechende Umsetzung der vorgenannten Ausführungen in eine Bauelemente-Anordnung ist in den Figuren 3 bis 11 dargestellt, die im folgenden näher beschrieben werden.

Figur 3 zeigt eine Bauelemente-Anordnung 1, die drei Bauelemente, vorzugsweise Halbleiterlaser, L1, L2 und L3 umfaßt. Der Aufbau der Anordnung selbst ist zweigeteilt, wobei im ersten Teil die drei Halbleiterlaser L1 bis L3 angeordnet sind. Desweiteren umfaßt der erste Teil der Anordnung Widerstandsheizungen H1 bis H6 sowie einen Teil der Kontaktfelder der Kontaktmatrix (K1-K4; K13-K16; K25-K28), wobei H1, H2 und K1-K4 zu Kanal 1 gehören, H3, H4 und K13-K16 Kanal 2 zugeordnet sind und H5, H6 sowie K25-K28 Kanal 3 zugeordnet sind. Die Widerstandsheizungen H1-H6 sind so angeordnet, daß sie in thermischen Kontakt zu den ihnen zugeordneten Halbleiterlaser L1 bis L3 stehen.

Der zweite Teil des Aufbaus besteht aus einem Isolator, auf dem sich für jeden Kanal, das heißt für jeden Halbleiterlaser L1 bis L3 der zweite Teil der Kontaktfelder der Kontaktmatrix befindet (K5 bis K12 für Kanal 1, K 17 bis K24 für Kanal 2 und K29 bis K36 für Kanal 3). Im vorliegenden Fall besteht die Kontaktmatrix aus einer eindimensionalen Matrix mit zwölf Feldern. Die Zuleitungen LQ zur Spannungsquelle Uo befinden sich am oberen Rand der Laserzeile und am unteren Rand der Kontaktzeile. Die Zuleitungen umfassen die Bereiche: A0, B, A1, K25, B, K26, A2, K13, B, K14, A3, K1, B, K2 sowie auf den Isolaten A4, K36. A5, K24, A6, K12, wobei B Bondverbindungen sind.

Die Zuleitungen enthalten somit Gebiete der Kontaktmatrizen.

Neben den Kontaktmatrizen befinden sich auf der Kontaktanordnung weitere Kontaktfelder K_{L1} bis K_{L3} , die über elektrisch leitende Bondverbindungen B mit

den Kontakten der Laserzeilen L1-L3 verbunden sind. Die Kontaktfelder K5 bis K12 von Kanal 1, K17 bis K24 von Kanal 2 und K29 bis K36 von Kanal 3 der Kontaktmatrizen sind durch räumlich verteilte Widerstandsanordnungen mit den Widerständen R1-R7; R8-R14 und R15-R21 elektrisch leitend verbunden. In Figur 3 sind sie als schwarze Schleifen dargestellt. Das Kontaktfeld K4 ist mit Kontaktfeld K5 über eine Bondverbindung elektrisch verbunden. Gleiches gilt für die Kontaktfelder K16 und K17 sowie K28 und K29. Die Versorgungsspannung der Widerstandsheizung wird zwischen den Bereichen A4 und A0 angelegt, was durch einen Pfeil angedeutet ist.

Die Einstellung der Widerstandsheizungen H1-H6 auf eine bestimmte Heizleistung P_q erfolgt durch das Verändern der Widerstände zwischen den Kontakten der Kontaktmatrix, was durch zusätzliche elektrische Verbindungen oder durch Verändern der schleifenförmigen Widerstandsanordnungen erzielt werden kann.

Die während des Abstimmungsverfahrens notwendige Variation der Heizleistung wird durch eine variable Spannung an der Spannungsquelle Uo eingestellt.

Das in Figur 4a gezeigte Ausführungsbeispiel folgt in wesentlichen Teilen dem Beispiel in Figur 3. Es unterscheidet sich durch die Anordnung der Kontaktmatrize, die in diesem Fall aus jeweils 11 Kontaktfeldern besteht (K1 bis K11 für Kanal 1, K12 bis K22 für Kanal 2 und K23 bis K33 für Kanal 3). Zwi-

schen den Kontaktfeldern K6 bis K10 und dem Kontaktfeld K11, K17 - K21 und K22 sowie K28 - K32 und K33 befinden sich ohmsche Widerstände mit den Werten:

R1 = R6 = R11 =
$${}^{1}/_{1}$$
 · R,
R2 = R7 = R12 = ${}^{1}/_{2}$ · R,
R3 = R8 = R13 = ${}^{1}/_{4}$ · R,
R4 = R9 = R14 = ${}^{1}/_{8}$ · R,
R5 = R10 = R15 = ${}^{1}/_{16}$ · R,

wobei der Widerstand R durch den maximal und minimal einzustellenden Widerstand festgelegt ist.

Es handelt sich somit um eine binäre Kodierung der Widerstandswerte, mit der es möglich ist, einen Widerstandsbereich von R bis R/2i aufzuspannen, wobei i die Zahl der Widerstände pro Kanal ist. Mit fünf Widerständen lassen sich so einunddreißig verschiedene Widerstandswerte einstellen, indem beispielsweise für den Kanal 1 elektrisch leitende Verbindungen von dem Kontaktfeld K5 zu den Kontaktfeldern K6 bis K10 hergestellt werden. Soll zum Beispiel der Widerstandswert 1/6 R für Kanal 1 eingestellt werden, so sind, wie in Figur 4a am Bauelement L1 ausgeführt, der Widerstand R2 = 1/2 R und der Widerstand R3 = 1/4 · R parallel zu schalten. Bei Bauelement L2 ist ein Widerstandswert von 1/25 R und bei Bauelement L3 ein Widerstandswert von 1/10 · R eingestellt.

Für den Fall, daß $U_0=2.5~V,R=480~Ohm~und~R_H=20~Ohm~ist,$ ist in Figur 4b der Heizleistungsverlauf auf der linken Ordinatenachse in Abhängigkeit

von dem eingestellten Index dargestellt. Der Widerstandswert ergibt sich zu $R_{res} = .R/_{Index}$. Die Leistung berechnet sich gemäß:

$$P(R) = \frac{U_o^2}{\left(R_{res} + R_H\right)} R_H$$

mit Rres als dem resultierenden Widerstand.

Auf der rechten Ordinatenachse der Figur 4b ist die relative Schrittweite aufgetragen. Eine relative Schrittweite von Eins entspricht der Schrittweite des linearen Zusammenhangs zwischen der Heizleistung und des eingestellten Index. Durch die Dimensionierung der Heizwiderstände H1 - H6, der Spannung Uo sowie des Widerstandes R ist eine gute Übereinstimmung mit dem linearen Verlauf erzielt worden.

Es kann von Vorteil sein, die Heizleistung P_q , zum Beispiel für hohe Heizleistungen, in überproportional kleinen (großen) Schrittweiten einzustellen, wie es in Figur 4c (Figur 4d) durch die Wahl der Versorgungsspannung und des Wertes für R geschehen ist. Für den Fall großer Schrittweiten bei hohen Heizleistungen (Figur 4d) beträgt die Heizspannung 20 V und der Wert von R = 8kOhm. Im Fall kleiner Schrittweiten bei hohen Heizleistungen beträgt die Heizspannung 1,5 V und der Wert für R = 40 Ohm.

Figur 5a zeigt eine Variation von Figur 3. Die schleifenförmigen Widerstandsverteilungen von Fig.3 sind in Fig.5a als gerade Widerstandsanordnung RI ausgeführt. Die Kontaktfelder K5 bis K12 greifen beispielsweise für Kanal 1 den Widerstand RI an unterschiedlichen Stellen ab. Auch bei diesem Beispiel können die resultierenden Widerstandswerte binär kodiert werden, sofern die Widerstände zwischen zwei benachbarten Kontaktfeldern aus K5 bis K12 für Kanal 1, K17 bis K24 für Kanal 2 und K29 bis K36 für Kanal 3 dimensioniert sind, wie beispielhaft für Kanal 1 gezeigt.

R1 = Widerstand zwischen K5 und K6 = R

 $R2 = Widerstand zwischen K6 und K7 = R \cdot 2$

R3 = Widerstand zwischen K7 und K8 = R · 4

R4 = Widerstand zwischen K8 und K9 = R · 8

R5 = Widerstand zwischen K9 und K10 = R · 16

R6 = Widerstand zwischen K10 und K11 = R · 32

 $R7 = Widerstand zwischen K11 und K12 = R \cdot 64$

Zum Beispiel ergibt sich für Halbleiterlaser L1 ein resultierender Widerstand von R1 + R3 + R4 + R6. Entsprechendes gilt für die restlichen Kanäle.

Figur 5b zeigt den Leistungsverlauf für den Fall der binären Kodierung. Anhand von Kanal 2 wird gezeigt, wie durch beliebig überschneidende Verbindungen zwischen den Kontaktfeldern, zum Beispiel durch Verbindungen zwischen den Kontaktfeldern K17 und K19 sowie K18 und K20, weitere Gesamtwiderstandswerte realisiert werden können.

In Figur 6 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Bauelemente-Anordnung gezeigt, wobei zur Einstellung der Heizleistung P_q sechs Widerstände pro Kanal (R1 bis R6 für Kanal 1; R7 bis R12 für Kanal 2 und R13 bis R18 für Kanal 3) zur Verfügung stehen. Über die Kontaktfelder K5 bis K18 (beispielsweise für Kanal 1) können die Widerstände über Bondverbindungen B beliebig miteinander verbunden werden.

Die in Figur 7 dargestellte Kontaktmatrix besteht aus 6 Kontaktfeldern pro Kanal. Die Felder K5 und K6 (für Kanal 1) sind mittels einer abstimmbaren Widerstandsanordnung elektrisch leitend miteinander verbunden. Die Widerstandsanordnung setzt sich aus zwei Gebieten S1 und S2 zusammen, die wiederum aus einem Gebiet mit elektrisch leitendem Material X (Kreuzschraffur) und einem isolierenden Bereich mit einem Isolator Y (weiß) bestehen. Durch das Aufbringen eines hochleitfähigen Materials I (schwarz), zum Beispiel Lot auf die Bereiche S1 und S2, wird der Gesamtwiderstand zwischen den Kontaktfeldern verkleinert. Der Bereich S2 dient zur Grobeinstellung und der Bereich S1 zur Feinabstimmung der Heizleistung.

Das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 8 ist gegenüber jenem gemäß Figur 7 dahingehend abgeändert, daß die Abstimmung durch Verändern des Widerstandes von beliebig geformten Gebieten, die als unterschiedlich gekennzeichnete Flächen dargestellt sind und unterschiedliche elektrische Leitfähigkeiten besitzen. Diese Widerstände RI-RV bestehen aus unterschiedlichem Widerstandsmaterial. Die Widerstandswerte der Widerstände RI-RV lassen sich zum Beispiel durch gezielte Materialveränderung, vorzugsweise Materialab- oder Materialauftrag auf den gewünschten Widerstandswert einstellen.

Materialabtrag bzw. Materialauftrag kann beispiels-weise durch Laserablation realisiert werden. Weiterhin ist es möglich, den Wicerstandswert der Widerstände RI-RV durch thermische Behandlung, chemische Behandlung oder elektrochemische Behandlung zu ändern. Weitere Möglichkeiten zur Änderung des Widerstandswertes werden in der Beeinflussung durch Teilchenimplantation, elektromagnetische Strahlung bzw. Teilchenstrahlung oder durch ein elektrisches Signal gesehen.

Das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 9 unterscheidet sich von jenem gemäß Figur 8 dadurch, daß beliebige elektrisch leitfähige Verbindungen zwischen den aus unterschiedlichem Widerstandsmaterial bestehenden beliebig geformten Widerständen angebracht werden. Bei den Verbindungen kann es sich zum Beispiel um Bondverbindungen B handeln. Die Abstimmung erfolgt durch Anbringen oder Entfernen von Bondverbindungen oder alternativ nach dem Verfahren wie in Bild 8 beschrieben.

In dem in Figur 10 gezeigten Ausführungsbeispiel werden die Widerstandsanordnungen RM für die 3 Kanäle durch die Widerstände R1 bis R3 ausgebildet.

Die Abstimmung erfolgt dadurch, daß elektrisch leitfähige Verbindungen, zum Beispiel Verbindungen B mit einer im Vergleich zur Widerstandsanordnung RM hohen elektrischen Leitfähigkeit angebracht werden.

In Figur 11 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel dargestellt, bei dem die Kontaktmatrix für Kanal 1 Kontaktfelder K1 bis K12 umfaßt. Zwischen den Kontaktfeldern K6 und K11 befinden sich elektrisch leitende Verbindungen R1 bis R6, die im Bild als gekrümmte Linien dargestellt sind. Durch zusätzliche elektrische Verbindungen, die als Bondverbindungen B ausgebildet sind, wird der Gesamtwiderstand der Kontaktmatrix abgeglichen.

Figur 12a zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem die Widerstände der Widerstandsanordnung RM auf der Bauelementezeile abgeordnet sind, so daß die Abstimmung der Widerstandsordnung RM auf der Bauelementezeile erfolgt.

Das zuvor beschriebene Verfahren zum Abstimmen der Halbleiterlaser L1 bis Ln soll nun anhand der Figur 12b nochmals kurz erläutert werden. So wird zunächst eine bestimmte Heizleistung P \geq 0 mittels der Widerstandseinrichtung RM1 bis RMn oder alternativ über die Spannungsquelle U_0 individuell für jeden Halbleiterlaser L1 bis Ln eingestellt. Anschließend erfolgt eine Wellenlängenmessung für jeden Halbleiterlaser L1 bis Ln. Anhand des funktionellen Zusammenhangs $\lambda(P)$ wird dann die dem ent-

sprechenden Halbleiterlaser L1-Ln zugeordnete Widerstandsanordnung abgeglichen. Je nach gewähltem Verfahren werden diese Schritte mehrmals ausgeführt, bis schließlich die gewünschte charakteristische Wellenlänge für jeden Halbleiterlaser L1-Ln erreicht ist.

An dem vorgenannten Ausführungsbeispiel wird deutlich, daß es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, mit Hilfe der erfindungsgemäß ausgebildeten Widerstandsanordnung RM1-RMn die Heizleistung Pq der einzelnen Widerstandsheizungen H1-Hn auf einfache Weise individuell einzustellen, ohne auf mehrere Spannungsquellen Uo zurückgreifen zu müssen. Insbesondere lassen sich die einzelnen Widerstände R1-Rn bzw. RI-RV usw. der Widerstandsanordnungen RM1-RMn jederzeit, also auch nachträglich, nach Inbetriebnahme der Bauelemente-Anordnung verändern. So ist es beispielsweise denkbar, durch Zeit- und Temperaturmessungen auf der Grundlage von Erfahrungswerten die Wellenlänge beziehungsweise die Heizleistung Pq zu verändern, um beispielsweise Alterungseffekte zu kompensieren.

Darüber hinaus ist die vorliegende Erfindung nicht nur auf die beschriebenen Halbleiterlaser L1-Ln anwendbar, sondern allgemein auf optoelektronische Bauelemente, wie optische Verstärker, Filter, Wellenlängenmultiplexer oder Wellenleiter.

Bei den vorgenannten Ausführungsbeispielen wurde als Energieversogungseinrichtung jeweils eine Spannungsquelle U_0 verwendet. Selbstverständlich ist es

ebenso möglich, eine Stromquelle I einzusetzen, wie es in Figur 13 dargestellt ist, wobei die Widerstandsanordnung RM1-RMn und die Widerstandsheizungen H1-Hn parallel und nicht in Reihe zueinander liegen.

Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen

L1-Ln Halbleiterlaser U₀ Spannungsquelle Ι Stromquelle Н Widerstandsheizung H1-Hn Widerstandsheizungen der Halbleiterlaser Hq Widerstandsheizung eines Kanals g Rq Widerstand der Widerstandsheizung eines Kanals q Widerstände der Widerstandsheizungen $R_{q,i,j}-R_{q,k,l}$ Rv1-Rv3 Vorwiderstände $R_{L1}-R_{L3}$ Leitungswiderstände von Rg elektrische Verbindungen der Span-LO nungsquelle Uo mit den Kontaktfeldern der einzelnen Kanäle g Pσ Heizleistung eines Kanals q RM Widerstandsanordnung Widerstandsanordnungen der optoelek-RM1-RMn tronischen Bauelemente R1-Rn Widerstände der Widerstandsanordnungen RI- RXVII Widerstände der Widerstandsanordnung, aus unterschiedlichem Widerstandsmaterial Verbindungen und leitfähigen Bereiche, A1-An die im eigentlichen Sinne keine Widerstände sind В Bondverbindungen K1-Kn Kontaktfelder (Bondpads)

Kontaktfelder

 $K_{t,1} - K_{t,3}$

 $K_{q,i,j}-_{q,k,1}$

Kontaktfelder

 $K_{q,t,u}-_{q,v,w}$

Kontaktfelder

x,y

Ortskoordinate

Weg

S1;S2

Verfahren und Anordnung zur Wellenlängenabstimmung einer optoelektronischen Bauelemente-Anordnung

(16) Patentansprüche:

- 1. Verfahren zur Wellenlängenabstimmung einer optoelektronischen Bauelemente-Anordnung mit zumindest zwei optoelektronischen Bauelementen, bei dem die Einstellung der charakteristischen Wellenlänge für jedes optoelektronische Bauelement unter Anwendung des Prinzips der thermischen Einstellung der charakteristischen Wellenlänge über die jeweilige Widerstandsheizung erfolgt, und bei dem die Wellenlängenabweichung anhand des Vergleichs der gemessenen Wellenlänge mit der gewünschten charakteristischen Wellenlänge ermittelt wird, dadurch gekennz e i c h n e t, daß die zur Einstellung der charakteristischen Wellenlänge des optoelektronischen Bauelements notwendige thermische Änderung der Widerstandsheizung (H) durch gezielte Änderung des Widerstandswertes einer der Widerstandsheizung (H) vorgeschalteten Widerstandsanordnung (RM) erfolgt.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daß die Änderung des Widerstandswertes der Widerstandsanordnung (RM) durch schaltungstechnische Maßnahmen erfolgt.

- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Änderung des Widerstandswertes der Widerstandsanordnung (RM) durch Materialveränderung, vorzugsweise Materialab- oder Materialauftrag erfolgt.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Änderung des Widerstandswertes der
 Widerstandsanordnung (RM) durch Laserablation
 erfolgt.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Änderung des Widerstandswertes der
 Widerstandsanordnung (RM) durch thermische Behandlung erfolgt.
- 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Änderung des Widerstandswertes der Widerstandsanordnung (RM) durch chemische bzw. elektrochemische Behandlung erfolgt.
- 6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Änderung des Widerstandswertes der Widerstandsanordnung (RM) durch Teilchenimplantation, elektromagnetische Strahlung bzw. Teilchenstrahlung erfolgt.
- 7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Änderung des Widerstandswertes der Widerstandsanordnung (RM) durch ein elektrisches Signal erfolgt.

- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß es in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt wird.
- 9. Anordnung zur Wellenlängenabstimmung einer optoelektronischen Bauelemente-Anordnung mit zumindest zwei optoelektronischen Bauelementen und
 zumindest einer jeweils einem Bauelement zugeordneten Widerstandsheizung (H) zur Einstellung
 der charakteristischen Wellenlänge des optoelektronischen Bauelements, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß jeder Widerstandsheizung (H1-Hn) eine separate, mit der gemeinsamen Spannungs- oder Stromquelle (Uo/I)
 verbundene, in ihrem Gesamtwiderstand veränderbare Widerstandsanordnung (RM1-RMn) vorgeschaltet ist.
- 10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Widerstandsanordnungen (RM1-RMn)
 aus einzelnen zu einem Widerstandsarray angeordneten Widerständen bestehen.
- 11.Anordnung nach Anspruch 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Widerstände der Widerstandsanordnungen (RM1-RMn) zwischen in Reihen
 liegenden Kontaktfelder (K1-Kn) geschaltet sind,
 wobei sie einem festen Ordnungsprinzip in Bezug
 auf ihre Widerstandswerte in der jeweiligen Reihe unterliegen, und daß die konkrete Ausbildung
 des Gesamtwiderstandes jeder einzelnen Widerstandsanordnung (RM1-RMn) über die Kontaktfelder

- (K1-Kn), vorzugsweise mittels Bondverbindungen (B), erfolgt.
- 12.Bauelemente-Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktfelder (K1-Kn) zur Anbringung elektrischer Leitungen, vorzugsweise als Kontaktfelder (K1-Kn) mit Bondpads ausgebildet sind.
- 13.Bauelemente-Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
 die Widerstände der Widerstandsanordnungen (RM1RMn) alternativ aus Metall, Nichtmetall, Halbleiter, Flüssigkeit, Gel, Keramik, Oxyd, MetallMatrix-Verbindung, Flüssigkristallen und Polymeren bestehen.
- 14.Bauelemente-Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
 die optoelektronischen Bauelemente auf einem ersten Körper und zumindest Teile der Widerstandsanordnungen (RM1-RMn) auf zumindest einem weiteren Körper angeordnet sind.
- 15.Bauelemente-Anordnung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Körper vorzugsweise aus Halbleitermaterialien besteht, und daß der zweite Körper ein Isolator ist.
- 16.Bauelemente-Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das optoelektronische Bauelement ein Halbleiter-

WO 99/28998 PCT/EP98/06911

-33-

laser, ein optischer Verstärker, ein Filter, ein Wellenlängenmultiplexer oder ein Wellenleiter ist.

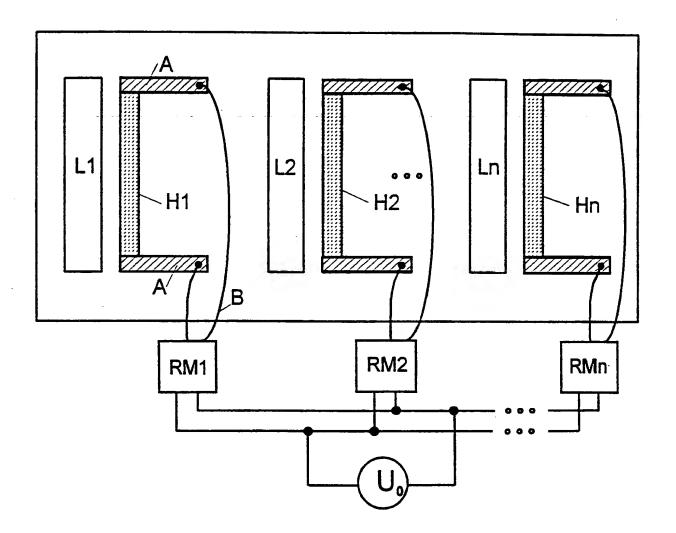
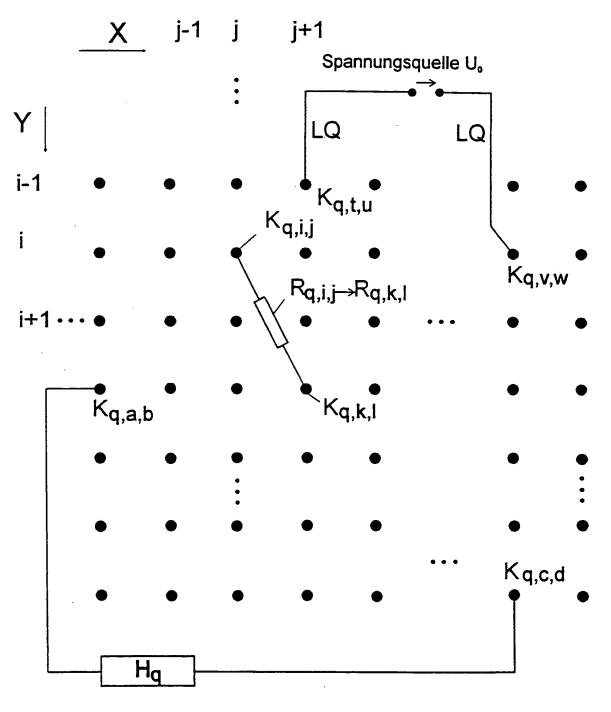


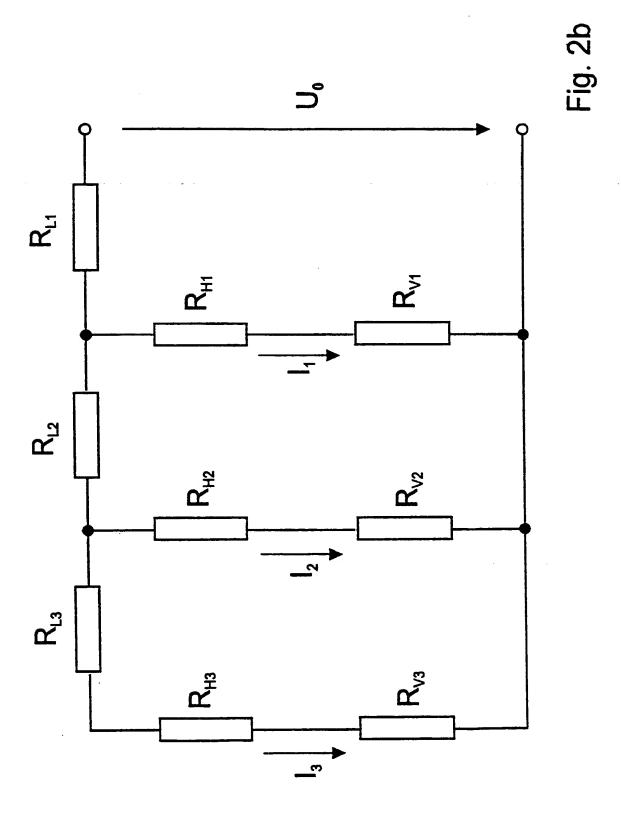
Fig. 1

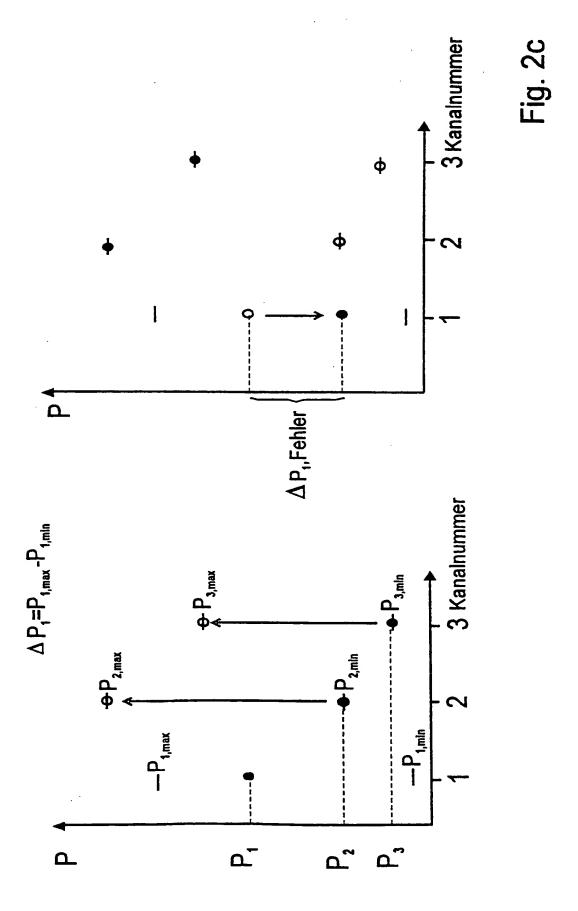
gezeichnet für Kanal q

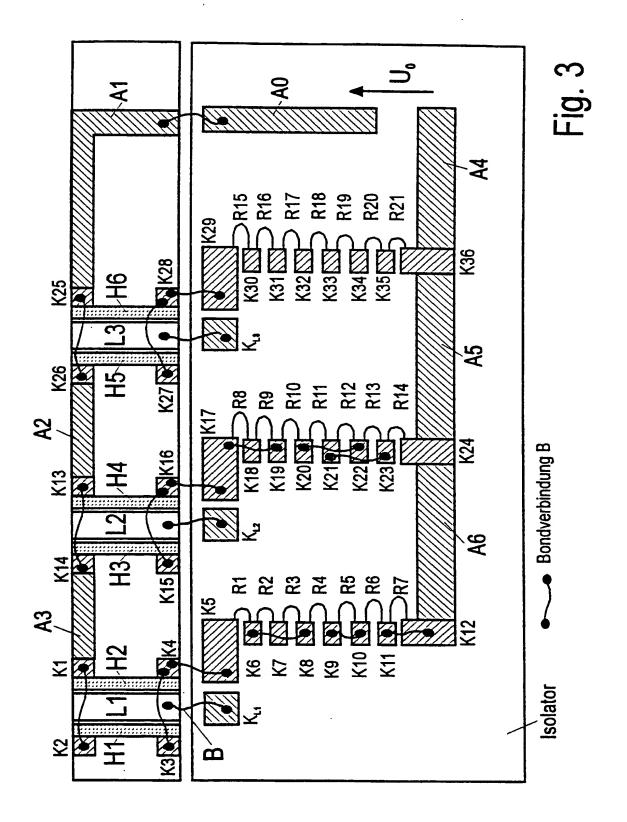


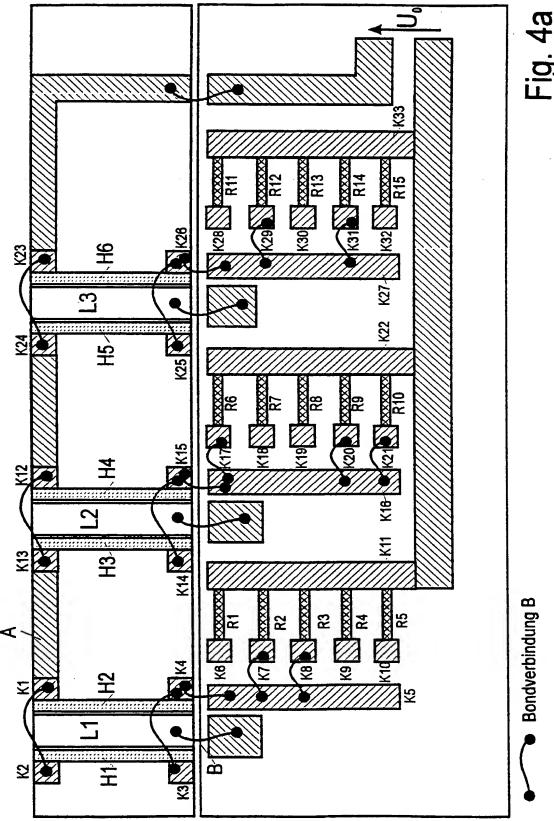
Widerstandsheizung

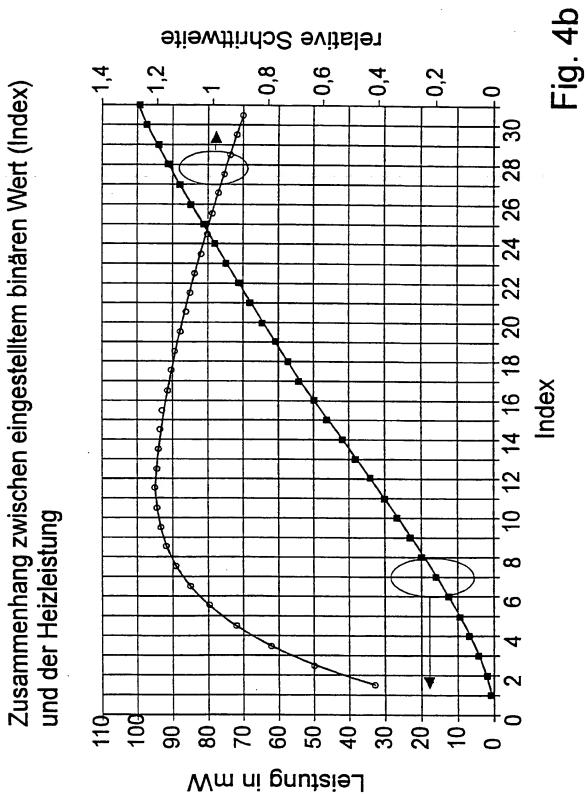
Fig. 2a

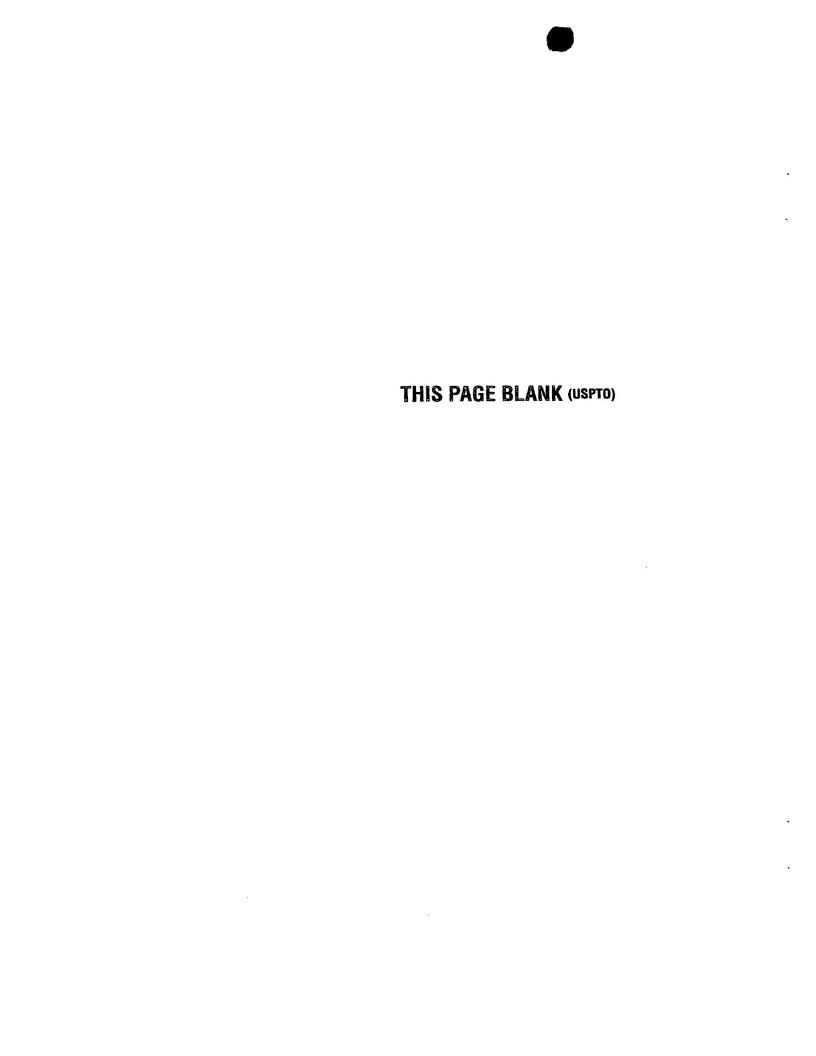




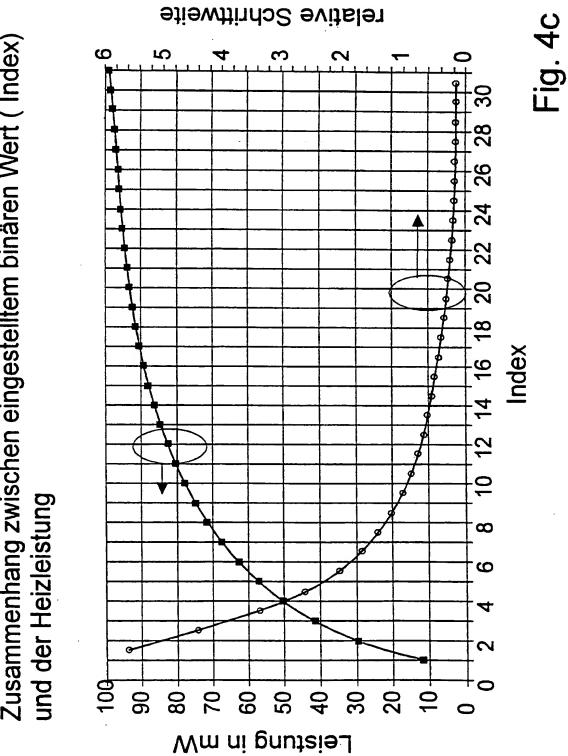






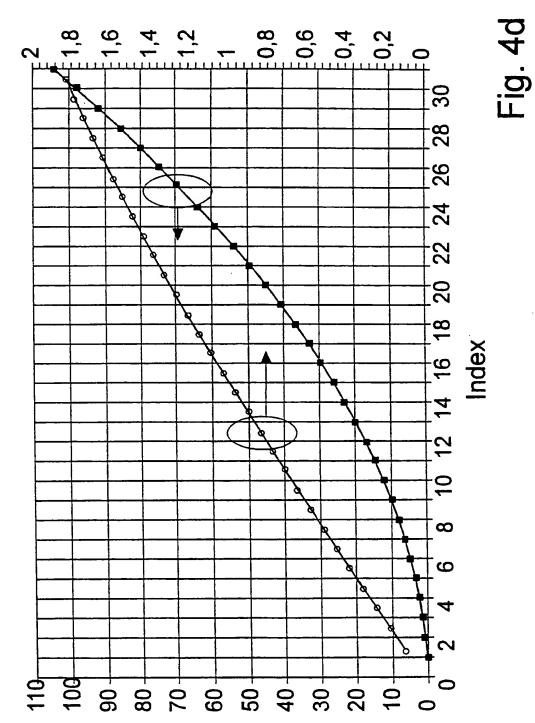


Zusammenhang zwischen eingestelltem binären Wert (Index)

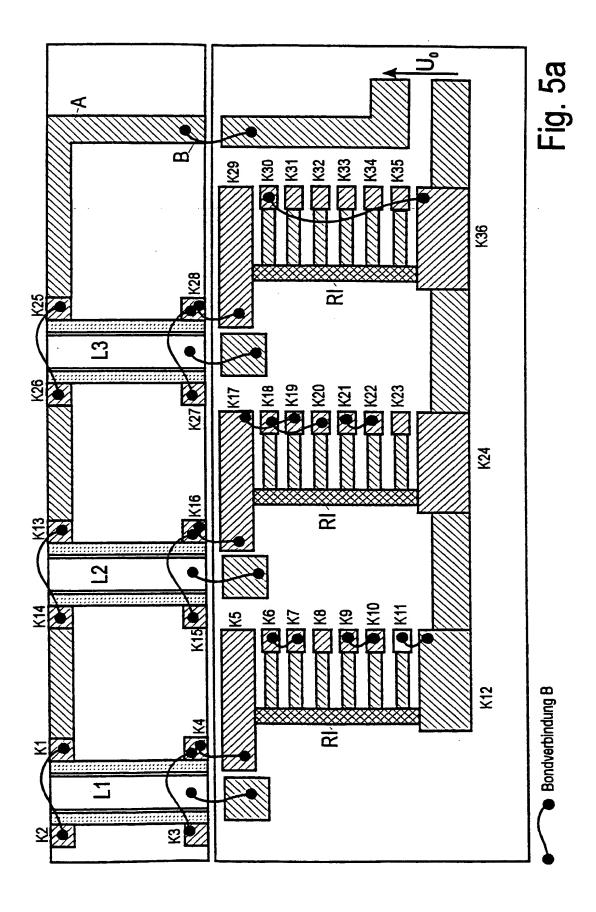


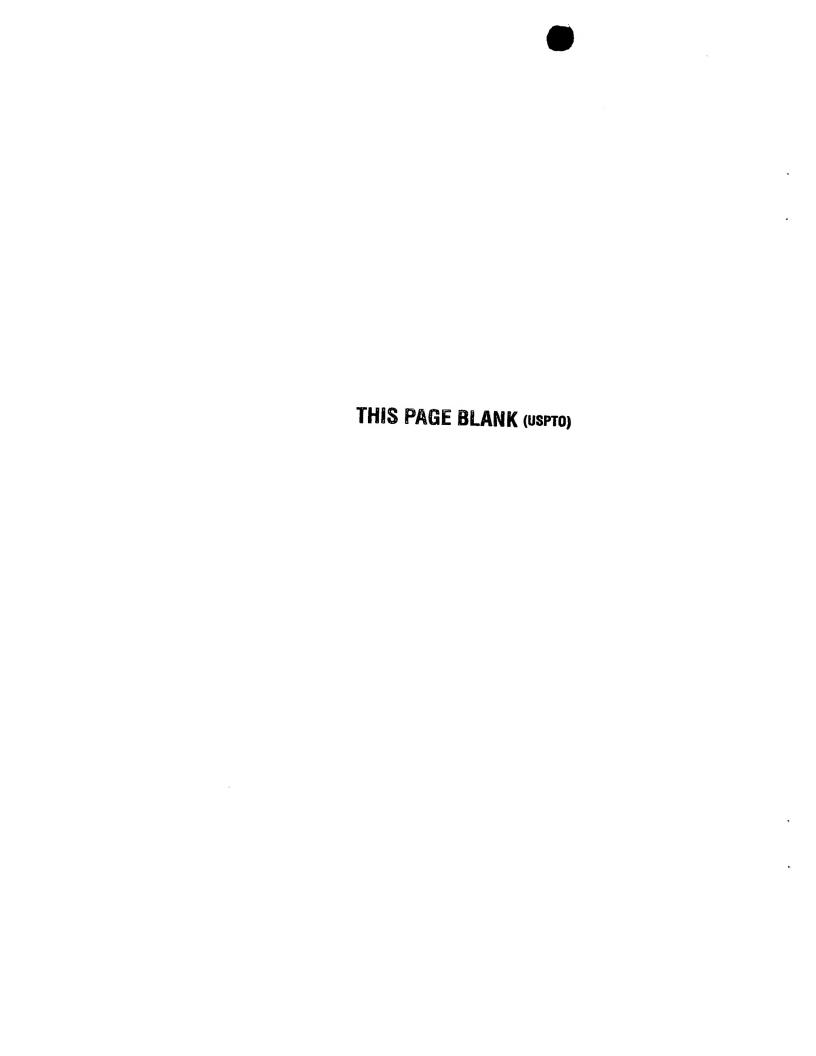
Wm ni gnutsiel

Zusammenhang zwischen eingestelltem binären Wert (Index) und der Heizleistung

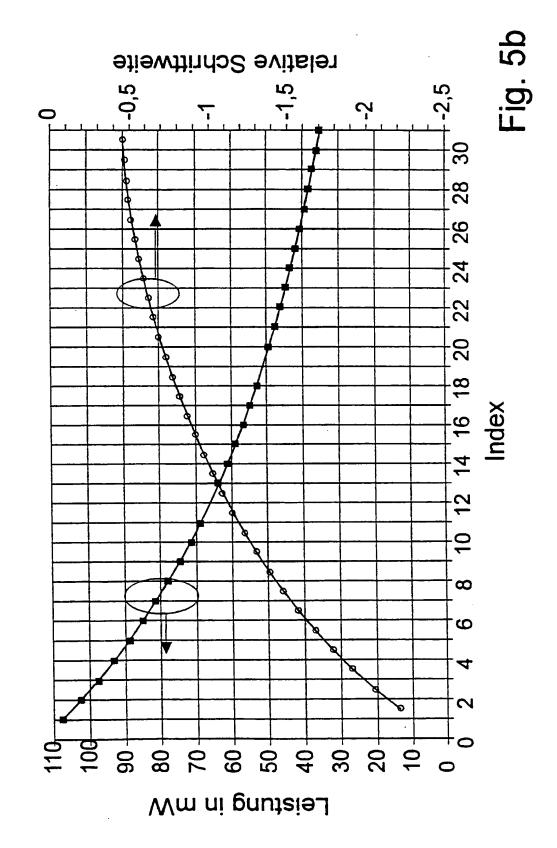


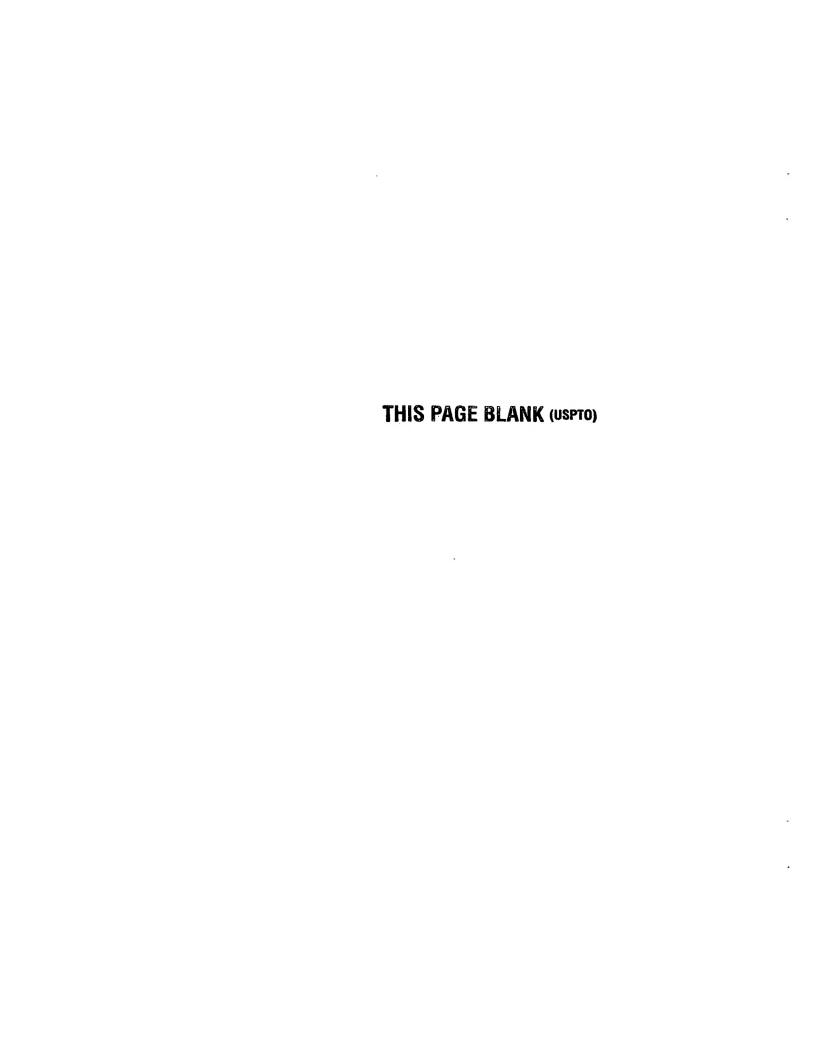
relative Schrittweite

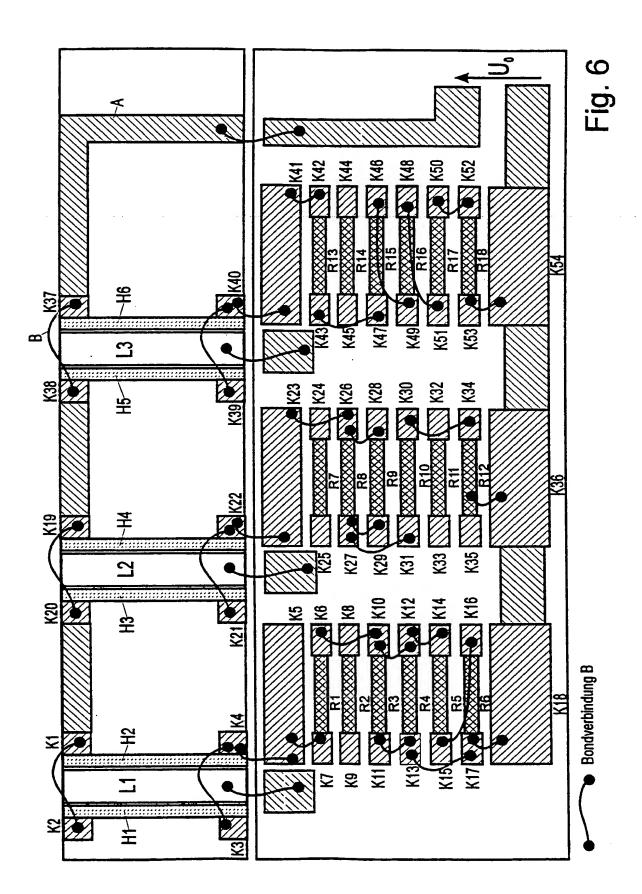




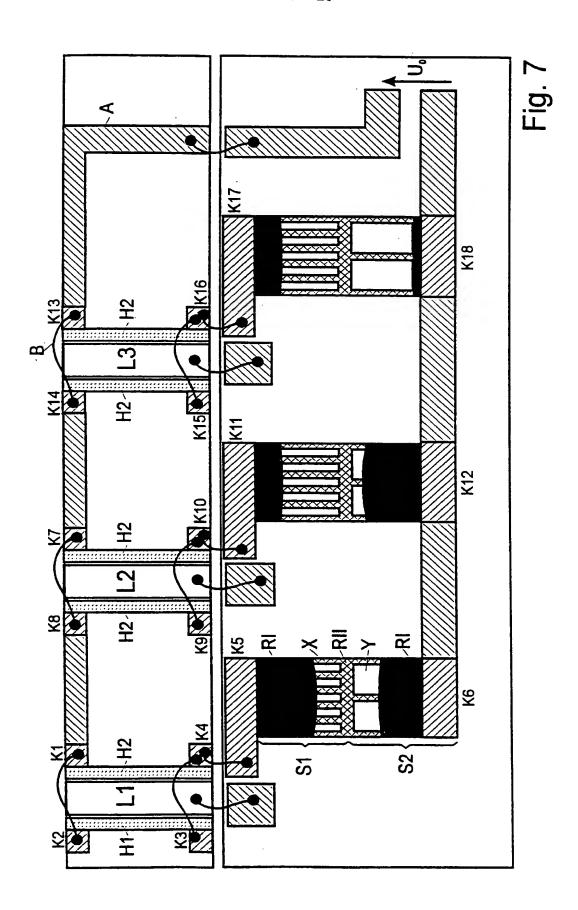
Zusammenhang zwischen binären Wert (Index) und der Heizleistung für Ausführungsbespiel 5a

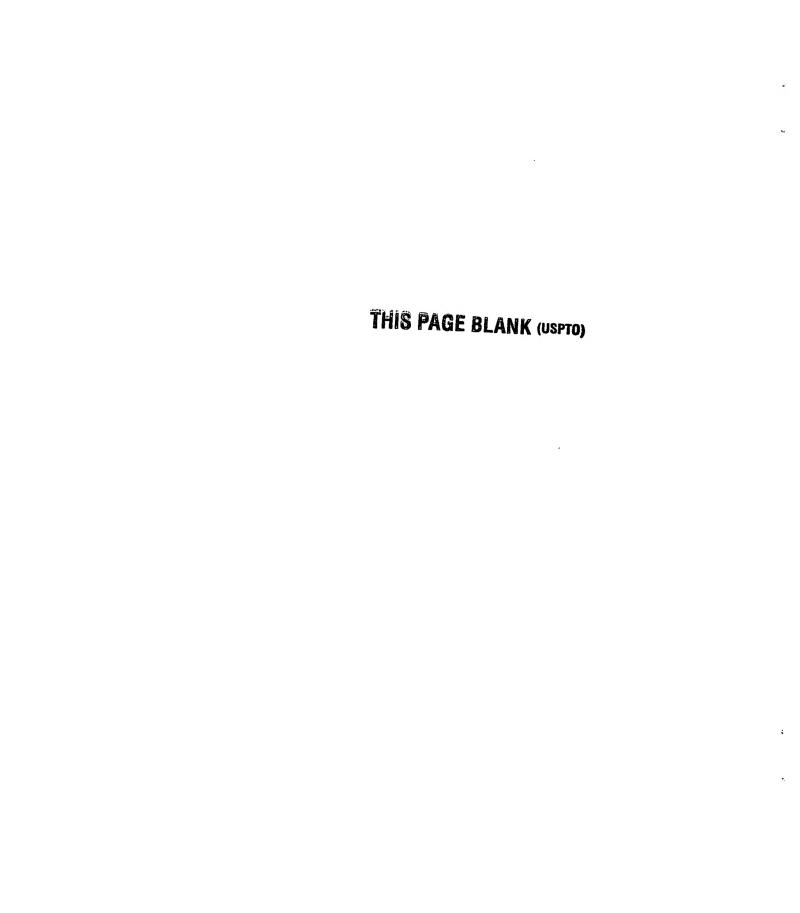


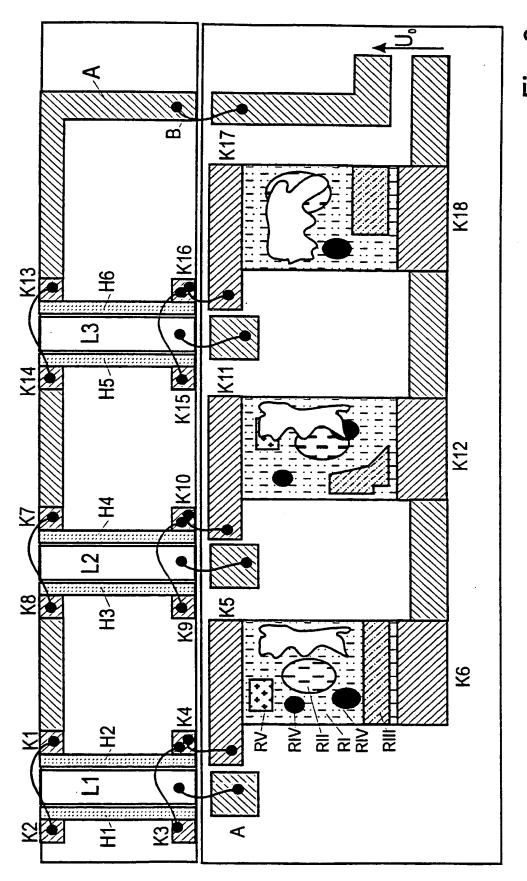




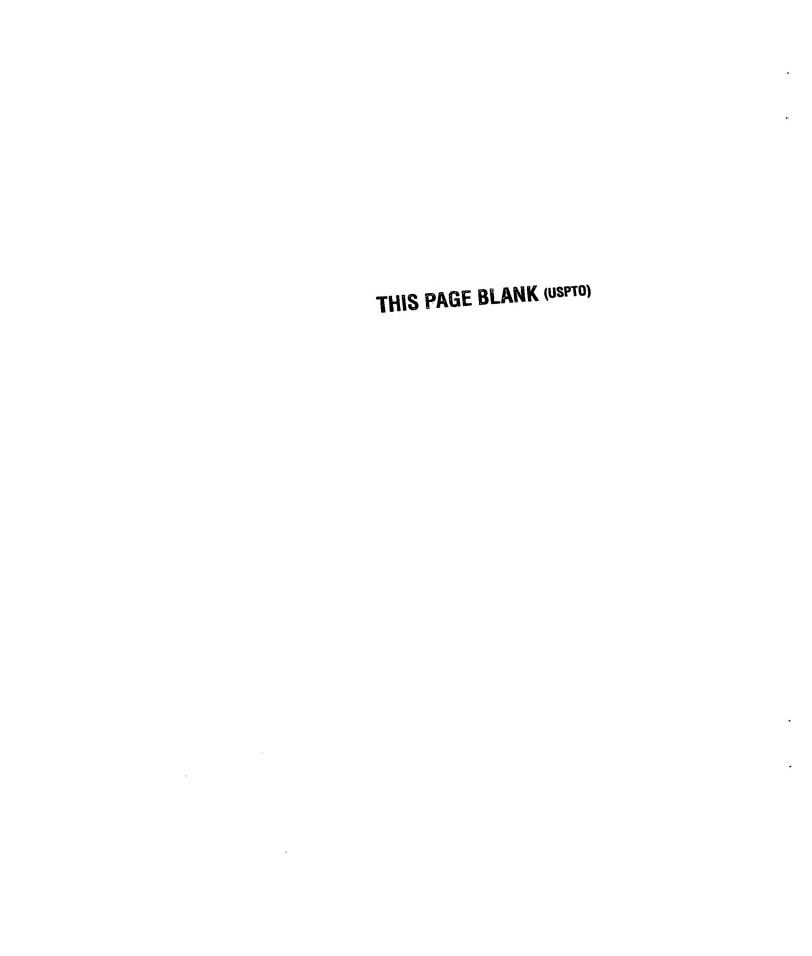






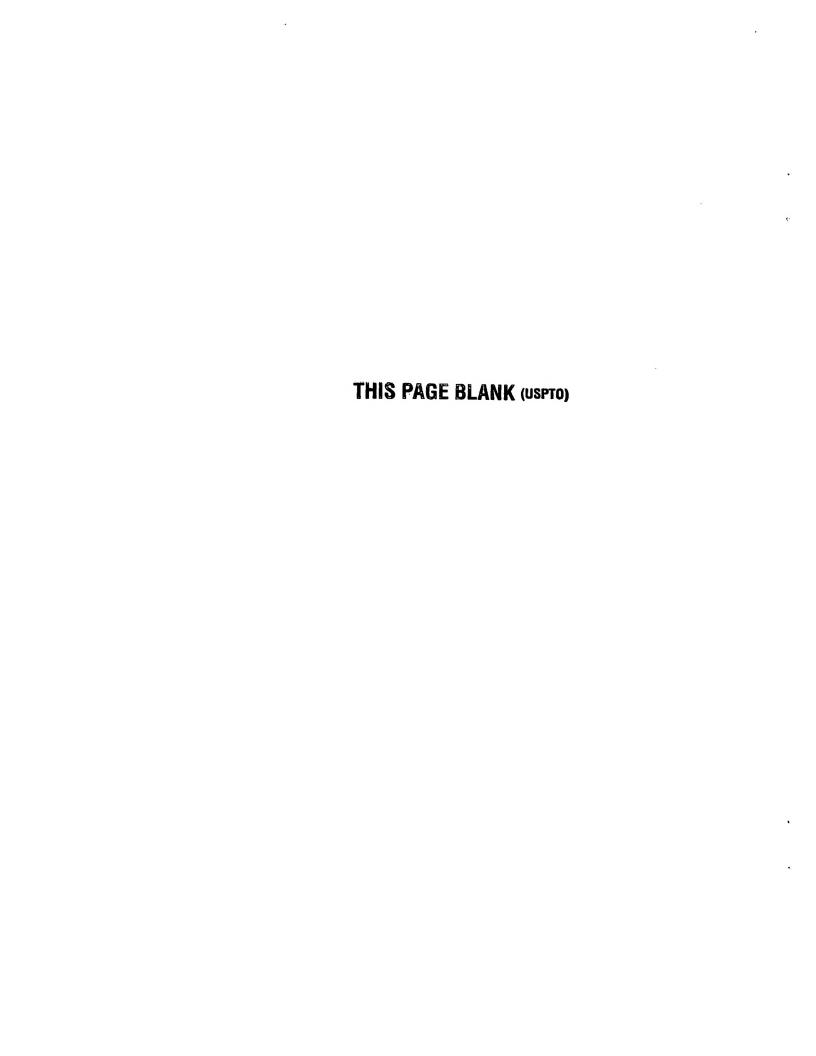


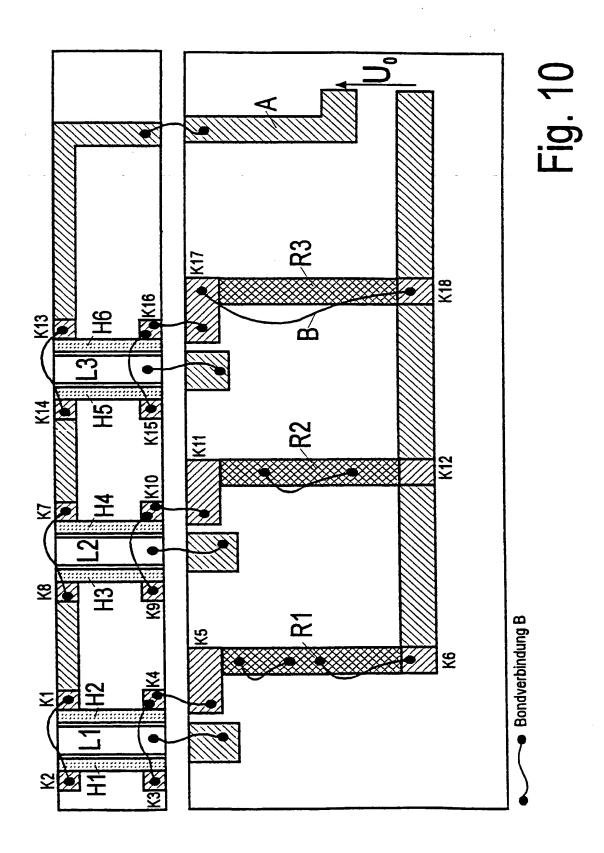
F<u>I</u>G. 8

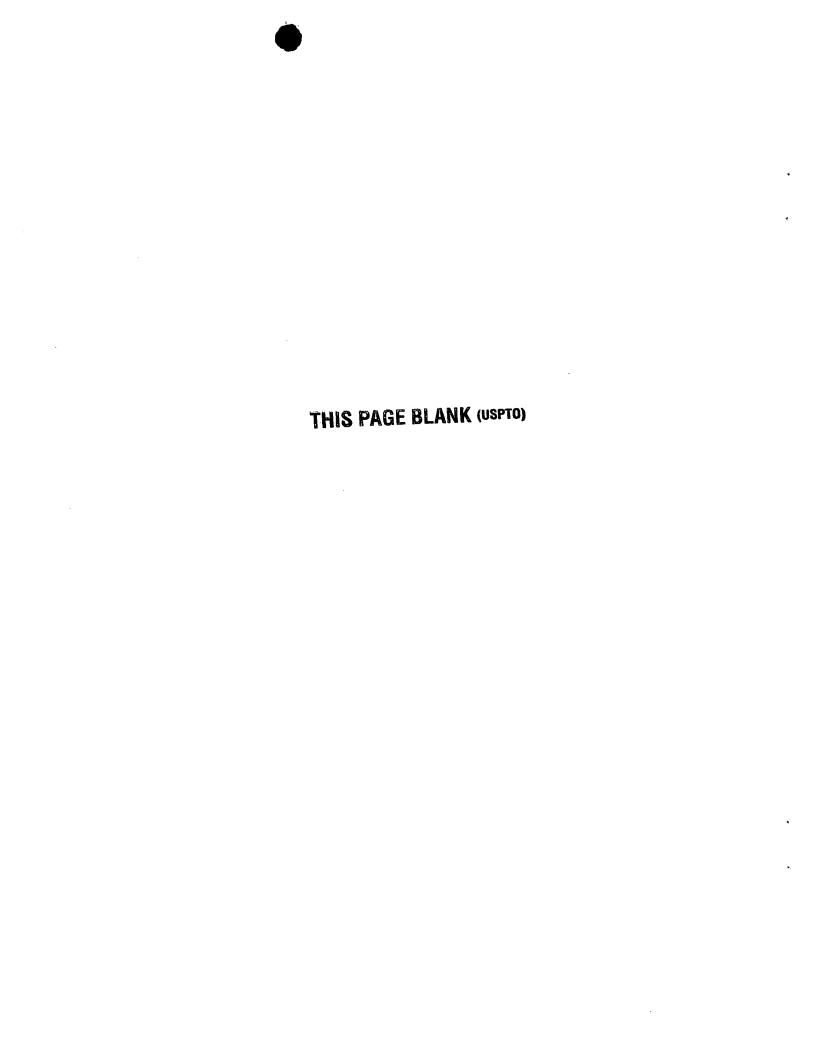


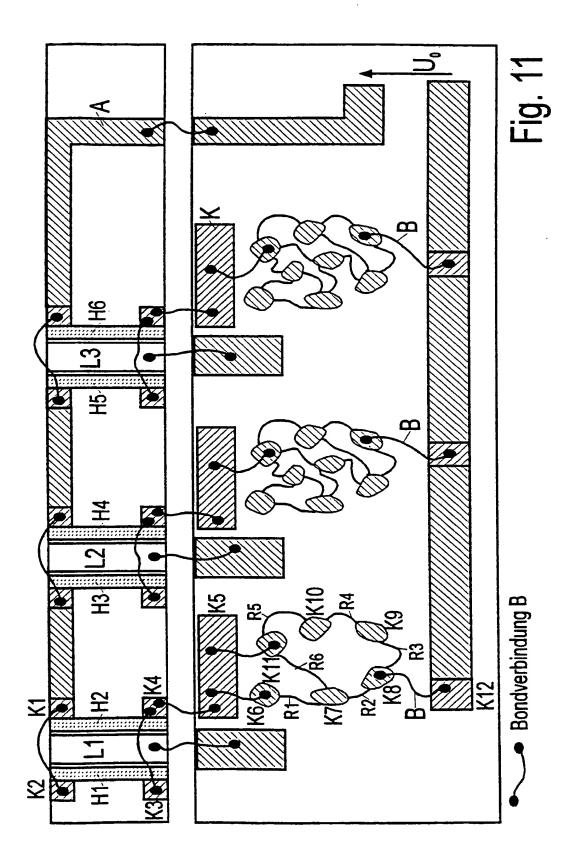
完 子, 88 Ŧ \mathbb{Z}

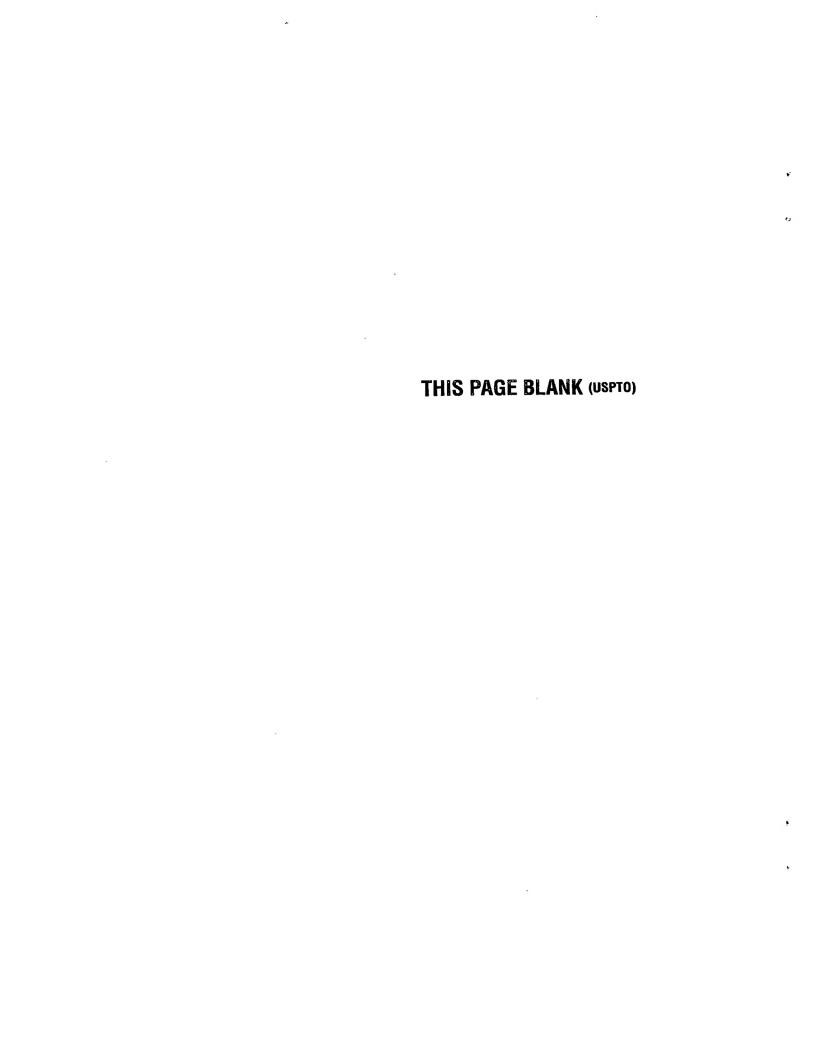
Bondverbindung B











R8 S4 S2 ည 至 - Bondverbindung B 王

Fig. 12a

THIS PAGE BLANK (USPTO)

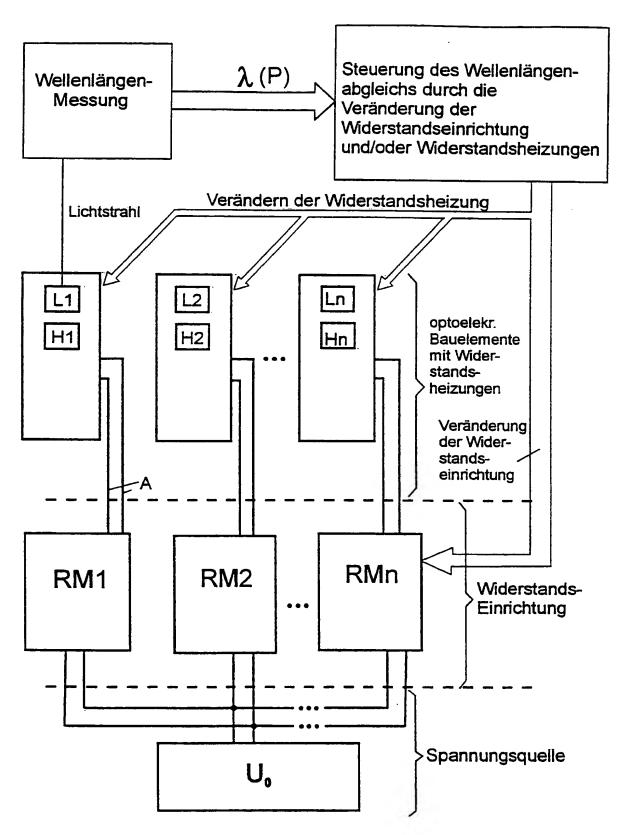
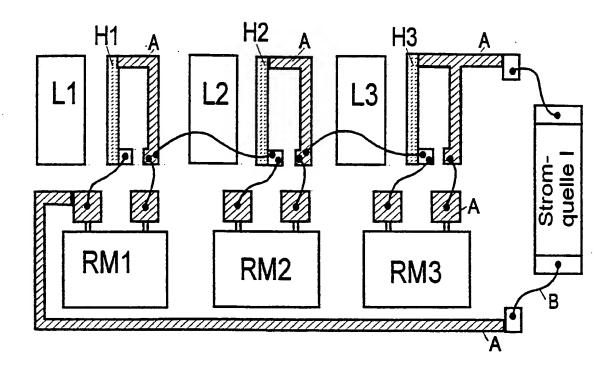


Fig. 12b

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Ausführungsbeispiel mit Stromquelle



- elektrische Schaltung für Ausführungsbeispiel:

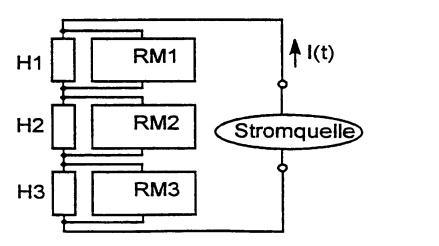
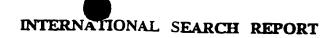


Fig.13

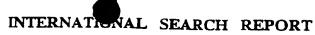
THIS PAGE BLANK (USPTO)



Interr. _nal Application No PCT/EP 98/06911

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER							
IPC 6 H01S3/103 H01S3/25							
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ation and IPC	·				
	Decimentation searched (classification system followed by classification	an eyembole)					
IPC 6	H01S	on symbols)					
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that s						
Documenta	s trait their trials minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fields se	arched				
		•					
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	se and, where practical, search terms used)				
	•						
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	·····					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.				
Α	US 5 536 085 A (LI GUO P ET AL)		1,9,16				
	16 July 1996						
	see column 3, line 63 - column 4,	line 31					
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1 0 16				
^	vol. 014, no. 002 (E-868), 8 Janu	1090	1,9,16				
	& JP 01 251686 A (CANON INC).	igi A 1909					
	6 October 1989						
	see abstract						
_							
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1,9,16				
	vol. 009, no. 065 (E-304), 26 Mar & JP 59 204292 A (CANON KK).	ch 1985					
	19 November 1984						
	see abstract						
		į					
	•						
Furti	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.				
° Special ca	tegories of cited documents :	"T" later document published after the inte	mational filing date				
	ent defining the general state of the art which is not	or priority date and not in conflict with	the application but				
considered to be of particular relevance cited to understand the principle or theory underlying the invention "E" earlier document but published on or after the international							
filing d	ate	"X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot	be considered to				
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention							
	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an involve an involve document is combined with one or mo	ventive step when the				
other r	neans	ments, such combination being obvious in the art.					
"P" document published prior to the international filing date but in the art. later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family							
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report							
10 Annil 1000							
1.	3 April 1999	20/04/1999					
Name and mailing address of the ISA Authorized officer							
European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk							
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Claessen, L					

1



Information on patent family members

PCT/EP 98/06911

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
US 5536085	A	16-07-1996	NONE	<u> </u>	

Interi ,nales Aktenzeichen
PCT/EP 98/06911

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 H01S3/103 H01S3/25							
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK							
B. RECHERCHIERTE GEBIETE							
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 H01S							
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen							
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)							
ļ			- ,				
CAISW	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Retracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
		o del in deliadri kommendari i osid	Dett. Anspitter Nr.				
Α	US 5 536 085 A (LI GUO P ET AL) 16. Juli 1996		1,9,16				
	siehe Spalte 3, Zeile 63 - Spalte 31	e 4, Zeile					
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 002 (E-868), 8. Januar 1989 & JP 01 251686 A (CANON INC),		1,9,16				
	6. Oktober 1989 siehe Zusammenfassung						
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 065 (E-304), 26. März 1985 & JP 59 204292 A (CANON KK), 19. November 1984 siehe Zusammenfassung		1,9,16				
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu sehmen	X Siehe Anhang Patentfamille	L				
	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem					
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen							
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindu "L" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindu kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf							
ander	en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedei	utung; die beanspruchte Erfindung				
ausge	ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichung die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und						
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen, Anmeldedatum, aber gech							
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts							
	3. April 1999	20/04/1999					
Name und f	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter					
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk						
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Claessen, L					



- Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern iales Aktenzeichen

PCT/EP 98/06911

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument Mitglied(er) der Patentfamilie Datum der Veröffentlichung Datum der Veröffentlichung US 5536085 16-07-1996 **KEINE**